

公告本

90.11.23 修正
年 月 日 補充

申請日期	88.9.23
案 號	88111106
類 別	B32B 5/00. 099 7/00

A4
C4

482728

(以上各欄由本局填註)

第88111106號		發 明 專 利 說 明 書		修正頁 修正日期：90年11月
一、發明 名稱	中 文	用以製造可移位黏性基材之黏著劑移轉裝置		
	英 文	ADHESIVE TRANSFER DEVICE FOR MAKING REPOSITIONABLY ADHEREABLE SUBSTRATE		
二、發明 人	姓 名	(1)卡爾 D. 紐保格 Neuburger, Carl D. (2)羅伯 V. 歐基菲 O'Keefe, Robert, V. (3)富蘭克林 C. 布萊德秀 Bradshaw, Franklin C.		
	國 籍	美國		
	住、居所	(1)(2)(3) 美國亞利桑那州史庫特戴爾·北第78路14698號 14698 North 78th Way, Scottsdale, Arizona 85260, U. S. A.		
三、申請人	姓 名 (名稱)	美商·賽隆公司 XYRON, INC.		
	國 籍	美國		
	住、居所 (事務所)	美國亞利桑那州史庫特戴爾·北第78路14698號 14698 North 78th Way, Scottsdale, Arizona 85260, U. S. A.		
	代 表 人 姓 名	小湯瑪斯 C. 音塞 Ensign, Thomas C. Jr.		

經濟部智慧財產局員工消費合作社印製

裝 訂 線

本紙張尺度適用中國國家標準 (CNS) A4規格 (210×297公釐)

五、發明說明(1)

發明領域

本發明有關一種黏著劑移轉裝置，用以製造可移位黏著基材。

發明背景

標籤、貼紙及其他可黏著基材的使用幾乎可見於生活各方面-學校課程、專業報告、檔案標籤、CD及卡帶、電腦磁碟、冰箱中的食品容器等。該等可黏著基材採用永久壓力感應黏著劑，若無溶劑幫助則難以移除標籤，此情況常造成問題，因為撕去標籤時，可在黏著表面留下標籤殘留物並使標籤失效。

譬如若某人整理一份專業報告時，許多報告需將如圖表及照片置於大型海報板上，進行此工作的一項裝置顯示於美國專利4,331,727號，該'727號專利的裝置為一捲釋放塗佈基材，其一側上覆有壓力感應永久黏著劑，用者展開該基材、然後拿取一個物件譬如照片或圖表、將其抵住展開的基材而將黏著劑移轉到該物件，然後該物件可黏結至海報板。

此型裝置的問題為：黏著的物件不易移出海報板並無法再度置放而不損及該板及黏著物件，因此，僅因圖表錯黏在錯誤板上或正確板的錯誤位置即需浪費數小時勞力，可瞭解類似問題存在於藝術及工藝、學校課程及其他範圍等領域中。

此型問題的另一範例係見於可黏著窗標示，許多商店及餐廳採用標示來廣告特賣、新品、假日主題等，可用永

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝
訂
線

五、發明說明(2)

久壓力感應黏著劑黏結至窗的內表面。當業主需移除標示時，常須使用溶劑及刮刀來移除標示，不當使用刮刀可損及窗戶並幾乎皆會破壞標示本身。

可移除或可移位黏著劑可避免這些與永久黏著劑持久性相關之問題，習知為了產生可移除或可移位方式黏結至一接觸表面的基材，該基材須塗有一底漆然後上底漆區域塗佈一市售液體狀可移位黏著劑或該黏著劑的一較呈固體“膠貼”，由於液體黏著劑或底漆可能溢出，此程序可能變得混亂。且黏著劑有時可為噴霧狀供應，難以平均施用於整體基材表面，人工施用底漆及黏著劑時亦可能忽略或遺漏基材的某處，並且，若這些材料僅用於有限施用次數，不應購買整瓶底漆及整瓶液體狀之可移位黏著劑或膠貼。

美國專利5,558,913號揭示了一種無底漆黏著劑構造，其中包括一支撐部、一層永久黏著劑、一層可移除式黏著劑、及一釋放襯墊。永久黏著劑層將可移除層黏結至支撐部，故可使支撐部可移除式黏至接觸表面，可移除式黏著劑對永久黏著劑的比值大於1:1，且兩黏著劑層結合的密度為18-25克每平方公尺的範圍，但'913號專利的主體未解決上述問題。

該'913號專利揭示了黏結至支撐部之永久層，並主要有關預製的預定尺寸標籤及貼紙，如郵標籤及檔案標籤。但'913號專利所揭示主體無法使先前既存的不黏基材-如照片、圖表及窗標示-合併於可移位黏著基材中。

結果，需要可用以生成對多種不同應用之不同型及尺

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

五、發明說明(3)

寸可移位黏著基材之一黏著劑移轉裝置。

因此本發明的一目的係為滿足上述需求，為達成此目的，本發明提供一黏著劑移轉裝置，以由一選定基材選擇性製造一可移位黏著基材。該裝置包含一底基材及配置於一部份底基材上之一層壓力感應可移位黏著基材，一層壓力感應永久黏著劑係配置鄰近與底基材相對之可移位黏著劑層。

一釋放表面係可移除式接合與可移位黏著劑層及底基材部相對之永久黏著劑層，該釋放表面的性質使得底基材及提供釋放表面的結構可彼此移開，使釋放表面自永久黏著劑層分離，並將黏著劑層留在底基材上而露出永久黏著劑層，故利用選定基材與永久黏著劑層的接合，而使露出的永久黏著劑層黏結至選定的基材。提供黏著劑層使得底基材及選定的基材可彼此移開，使底基材與可移位黏著劑層分離，並將兩黏著劑層留在選定基材上而露出可移位黏著劑層，故可使選定基材(a)利用露出的可移位黏著劑層與接觸表面之接合並對選定基材施壓，而可移位式黏至一接觸表面(b)隨後，移出接觸表面並可移位式黏結至另一接觸表面。

永久黏著劑層的性質與厚度較佳足以結合至譬如布料、地毯及類似物等之紋理表面，當採用較少量黏著劑時，永久層能夠黏結至平坦表面譬如玻璃及紙，但難以結合至如布料等紋理表面。'913號專利中所揭示的黏著劑層僅足以結合一清潔平坦的支撐部，譬如標籤組裝期間提供的預

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝
訂
線

五、發明說明(4)

製支撐部，相反地，根據本發明之永久層的較佳厚度及性質可使黏著劑層結合至多種不同材料，包括清潔平坦的表面及不平的紋理表面。

可移位黏著劑對於永久黏著劑的重量比值較佳大於1:1，該比值較佳確使永久黏著劑不混合並克服該可移位黏著劑，故使後者喪失可移位特徵，但是此比值對於本發明並不重要。

可移位黏著劑所用的黏著劑較佳類型係為一微滴型黏著劑，微滴型黏著劑對於多種不同表面表現出優良的結合特徵，此外，微滴型黏著劑對於結合強度與特徵提供優良的控制，永久黏著劑所用的較佳黏著劑類型係為以丙烯酸乳劑為基礎的黏著劑。

可以多種不同方式實施本發明的廣泛原則，本申請案揭示了多種的不同示範裝置，其採用本發明的原理，包括黏著劑移轉片、配合使用一黏著劑移轉裝置之一黏著劑移轉匣、及用於分配一塗有黏著劑材料的基材之一基材分配器，但本發明原理不限於這些示範裝置。

可由下列詳述及圖式及申請專利範圍，來瞭解本發明之其他目的、特徵及優點。

圖式簡單說明

第1圖為根據本發明原理的各黏著劑移轉片之剖視圖

；

第2圖係為含有第1圖所示多數各黏著劑移轉片之一黏著劑移轉板塊的立體圖；

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

五、發明說明(5)

第3圖係為第1圖之各黏著劑移轉片之立體圖，其中一黏著劑罩為剝回之一透明塑膠片並移除了釋放襯墊；

第4圖係為第1圖之各黏著劑移轉片之立體圖，其中一原片(master)配置於該處進行一黏著劑移轉作業，且透明塑膠片移回成覆蓋之關係；

第5圖係為第1圖的各黏著劑移轉片之立體圖，其中透明塑膠片剝除而脫離覆蓋關係，且在已進行黏著劑移轉作業之後移除原片；

第6圖為根據本發明原理設計之一黏著劑移轉片的第二實施例之剖視圖；

第7圖為根據本發明原理設計之一黏著劑移轉片的第三實施例之剖視圖；

第8圖為實施本發明原理之黏著劑移轉匣的側視圖；

第9圖為第8圖之黏著劑移轉匣的正視圖；

第10圖為第8圖中虛線及A顯示之區域的放大圖；

第11圖為第8圖的黏著劑移轉匣中之一供輥一端之組件的分解圖；

第12圖顯示供輥如何安裝於第8圖的黏著劑移轉匣的匣體結構中之剖視圖；

第13圖為可供第8圖的黏著劑移轉匣使用之一黏著劑移轉機之立體圖；

第14圖為第13圖所示的機器之剖視圖；

第15圖為黏著劑罩及釋放墊端點之立體圖，其間黏有一匣啟動器；

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝
訂
線

五、發明說明(6)

第16圖係為一基材分配器形式的黏著劑移轉裝置之輪廓圖。

本發明較佳實施例之詳細描述

第1-5圖顯示黏著劑移轉板塊10形式之一黏著劑移轉裝置，其中實施了本發明的原理。第2圖顯示板塊10之立體圖，板塊10包括多數的各黏著劑移轉片12，以習知方式結合，該結合可包括一螺旋結合、黏著劑結合、或可供多數各片結合之任何其他裝置。

第1圖顯示各黏著劑移轉片12之剖視圖，加大該剖視圖的比例以更清楚顯示本發明原理，片12包含一底基材14，其可為一紙、塑膠片或任何其他適當材料，底基材14塗有一層壓力感應可移位黏著劑16，該層可移位黏著劑16係為不隨時間凝固或變成永久黏結之黏著劑，且因其可自表面移除故稱為可逆性。一該可移位黏著劑係由壓力感應黏著劑微滴所構成，但可採用任何適當可移位黏著劑來形成該可移位黏著劑層16。

一層壓力感應永久黏著劑18係結合至可移位黏著劑層16而覆蓋整層16，該層永久黏著劑18係由一適當黏著劑構成，其具有適用於延長期間之較強及耐久的結合性質，可瞭解此一適當黏著劑可包括一丙烯酸乳劑黏著劑、一橡膠基黏著劑、或表現耐久結合性質之任何適當材料。並可瞭解在永久與可移位黏著劑層16、18間不須如圖呈直接結合而可視需要提供一中介層。

一釋放襯墊20可移除式覆蓋該層永久黏著劑18，釋放

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

換

五、發明說明(7)

襯墊20可為一普通的釋放襯墊或一差異型釋放襯墊，一普通的釋放襯墊其兩側以譬如矽樹脂或類似物之一低磨擦材料加以處理，而有使黏著劑結合之一低的親和力；差異型釋放襯墊僅有一側以此方式處理。一般而言，任一型釋放襯墊均可由一紙或合成材料構成，不論釋放襯墊20為差異型或普通型，至少接合該永久黏著劑層18的釋放襯墊20的釋放表面22係對於與黏著劑結合設有較差的親和力。釋放表面的性質使得底基材14可移開釋放表面22而不將該等黏著劑層16、18自底基材14剝除，將黏著劑層16、18留在底基材14上而露出永久層18。易言之，釋放表面22可使釋放襯墊20覆蓋式配置於整體永久黏著劑層18上以保護黏著劑層16、18不受暴露，但易自黏著劑移轉片12移除而不將黏著劑層16、18自底基材14移除，可提供一橫向延伸的刻線21以便利移除釋放襯墊20。

最後，一透明塑膠片24形式的可黏著罩配置於釋放襯墊20上方，該透明塑膠片24比釋放襯墊20具有較佳之黏結特徵，特別是，透明塑膠片24所需的黏結性質使得：當釋放襯墊20移出對於永久黏著劑18層的覆蓋關係並與黏著劑移轉片12分離時，塑膠片24可移入直接接觸永久黏著劑層18以覆蓋整層18。該層永久黏著劑18將結合至片24，可人工施壓至片24以加強該結合，塑膠片24可接著剝回將兩黏著劑層16、18皆自底基材14移除。

本發明範圍中，可使用將黏著劑材料18黏在塑膠片24適當位置中之任何其他材料(譬如紙、布料等)，透明塑膠

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝 · · · · · 訂 · · · · · 線

五、發明說明(8)

片24較佳僅使得用者可在黏著劑移轉作業期間經由該片觀察選定基材或原片26。

可瞭解黏著劑層16、18可由任何適當程序構成，此程序中，壓力感應永久黏著劑18層係塗在釋放襯墊20的釋放表面22上，而可移位黏著劑16層塗在底基材14上，底基材14與釋放襯墊20接著合併以使該層永久黏著劑18與該層可移位黏著劑16相接觸，另一此程序中，該層可移位黏著劑16塗在底基材14上，然後該層永久黏著劑18塗在該層可移位黏著劑16上，該釋放襯墊20接著配置於該層永久黏著劑材料18上以覆蓋整層16，此第二方法可由如美國專利5,558,913號所述的一習知帷幔塗佈作業進行，其整體以提及方式併入本申請中。

根據本發明原理設計之一黏著劑移轉片12可在選定基材26上進行一黏著劑移轉作業，圖中，所示基材26僅為一胚料紙卡，但是，多種不同選定基材可配合使用本發明之黏著劑移轉片，譬如可能需在名片、辦公室用品、節日飾物、學校課程、藝術及工藝專案等中進行一黏著劑移轉作業。

為了利用本發明之黏著劑移轉片12進行一黏著劑移轉作業，透明塑膠片24先由釋放襯墊20剝回，如第3圖所示，而釋放襯墊20接著移出與該層永久黏著劑18之覆蓋關係而露出該層18。由於層16、18間之結合及可移位黏著劑16與底基材14間之結合比起可在永久黏著劑層18與釋放表面22之間出現的任何結合更強，當釋放襯墊20移出覆蓋關係

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

五、發明說明(9)

時，黏著劑層16、18留在底基材14上。

選定基材26的表面接著接合永久黏著劑層18，而透明塑膠片24移入選定基材26與永久黏著劑層18上之覆蓋關係(第4圖)，接著施壓至片24覆蓋該選定基材的部份，以確使永久黏著劑18足夠黏結至基材26。

下個步驟係為將透明塑膠片24自選定基材26及永久黏著劑層18剝回(第5圖)，當透明塑膠片24剝回時，永久黏著劑層18未受選定基材原片26覆蓋的部份係黏至塑膠片24，且與可移位黏著劑層16未受基材26覆蓋的部份自底基材14移除或“剝除”。接著透明塑膠片24與黏至該處的永久及可移位黏著劑層16、18的剝除部份一起拋棄，最後，選定的基材26自底基材14移除，黏著劑層16、18間之結合使得底基材14可較移開選定基材26，以將黏著劑16、18留在選定基材26上而露出可移位黏著劑層16。藉由露出的可移位黏著劑16與接觸表面的接合，選定的基材26可接著可移式黏至所需接觸表面，然後移除及重新置放而數次可移式黏至其他所需接觸表面。

黏著劑罩(亦即塑膠片24)的使用特別優點為：其自底基材14“剝除”所有黏著劑材料，該罩可接著坍塌並棄置而無使黏著劑材料不當碰到用者手部，此“剝除”特徵加強了黏著劑移轉程序並使其成為一簡易、清潔及簡化作業。

第6圖顯示一黏著劑移轉片30之第二實施例，其中實施本發明的原理，第二實施例的片30除了未提供罩之外皆類似第一實施例的片12，該罩具有一底基材34、配置於底

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝 · 訂 · 線

五、發明說明(10)

基材34上之一層壓力感應可移位黏著劑32、結合至可移位黏著劑層32並將其覆蓋之一層壓力感應永久黏著劑36、及覆蓋了與可移位黏著劑層32相對的永久黏著劑層36之一釋放襯墊38(具有刻線39)。為從一選定基材選擇性製造一可移位黏著基材，釋放襯墊38係由底基材34移開，以將黏著劑層32、36留在底基材34上而露出永久黏著劑層36。露出的永久黏著劑層36接著與選定基材相黏結，然後底基材34自選定基材移開(或選定基材由底基材34移開)，以離開永久黏著劑層36，其係黏結至選定基材，其中可移位黏著劑層32黏結至永久黏著劑層36並露出。最後藉由其間的露出可移位黏著劑層32之接合，選定的基材可移位式黏至一接觸表面。

第7圖顯示一黏著劑移轉片50之另一實施例，第7圖的片50具有一底基材52、一層壓力感應可移位黏著劑54塗在底基材52上、及一層壓力感應永久黏著劑56塗佈並結合在該層可移位黏著劑52上。一單釋放襯墊/黏著劑單基材58係以覆蓋關係接合並位於永久黏著劑層56上，基材58具有兩個相對表面、一釋放表面60及一剝除表面62。一般在使用該片50之前，釋放表面60與永久黏著劑層56相接合，以譬如矽樹脂或類似物等一低磨擦材料處理該釋放表面60，使其類似第1-5圖實施例所述的釋放表面22方式對黏結具有一低親和力。相反地，剝除表面62相較於釋放表面60對黏結具有一較高親和力，基材58較佳係由可黏結永久黏著劑層56紙之一合成材料製造，而剝除表面62則保持未塗佈

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

五、發明說明(11)

，使得永久黏著劑層56可黏結在該處。

為了進行片50的黏著劑移轉作業，拉回釋放襯墊/黏著劑單基材58以將釋放表面60移出與永久黏著劑層56的接合，因為黏著劑層54、56之間的結合及可移位黏著劑層54與底基材52之間的結合係比永久黏著劑層56與釋放表面60之間存在之任何結合更強，兩層54、56皆留在底基材52上，然後，選定的基材可接合永久黏著劑層56，該基材58可接著反過來置於選定基材上方，使得剝除表面62接合並覆蓋該選定基材及永久黏著劑層56在選定基材周圍露出的部份。接著可施壓至基材58，確使永久黏著劑層56黏結至選定基材及剝除表面62。

然後，釋放襯墊/黏著劑單基材58可拉回離開底基材52，以剝除黏著劑層54、56未受離開底基材52之選定基材覆蓋的所有部份。釋放襯墊/黏著劑單基材58接著可隨剝離的黏著劑棄置，然後選定的基材可自底基材52剝回，而永久黏著劑層56保持結合在選定基材上，而可移位黏著劑層54保持結合至永久黏著劑層56，故可移位黏著劑層54露出並可就緒黏結至一表面。本發明此實施例之一優點為：一釋放襯墊及一黏著劑單的功能係合併在一單基材中，故降低片50的整體成本。

根據本發明原理設計之這些各黏著劑移轉片12提供一快速簡單且價廉的裝置，以進行一黏著劑移轉作業而產生一可移位黏著劑基材，這些各片可較廉價地各別或以不同數量製造及銷售(亦即為10、25、50等板塊)，以滿足不同

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝
訂
線

五、發明說明(12)

用者的需求，該等板塊對於需進行有限次數的黏著劑移轉作業之黏著機提供廉價的採購選擇。這些板塊亦提供了對於使用液體黏著劑材料、黏膠帶、膠貼等製造家用可移位式基材之更清潔且更簡單的選擇。

第8圖顯示一可移除式黏著劑移轉匣110，根據本發明原理製造，匣110可配合使用美國專利5,584,962、5,580,417及佩克之美國專利申請09/189,273號揭示之任何黏著劑移轉及疊層機，各整體以提及方式併入本申請。

匣110包含一匣體結構112、一上供輓114、及一下供輓116。上及下供輓114、116係可旋轉式安裝於匣體結構112並橫向延伸於相對側壁118、120之間，如第8圖所示，上供輓114、116的軸線略位於匣體結構112內部之外，但是，供輓114、116可完全位於匣體結構112內部。一上壁122及一下壁124橫向延伸於相對側壁118、120之間，一後壁126延伸於上及下壁122、124之間並橫向延伸於側壁118、120之間，後壁126具有通過該處形成之一基材進給開口128，詳述如下。

兩對供輓安裝結構130將供輓114、116可旋轉式安裝至匣體結構112，各安裝結構130包括一概呈圓形保護結構132及一匣體附接結構134，概呈圓形保護結構132作用係為：覆蓋供輓114、116的軸向面對側以保護其不受損害，並使雜屑不與配置於供輓114、116上的黏著劑材料相接觸。

如第11圖所示，一概呈圓形輓附接結構136設有一徑

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

始

五、發明說明 (13)

向延伸外板構件138，該輓附接結構136的結構係接收於一供輓114、116內部中，並較佳利用一黏著劑加以固定，輓附接結構136亦包括一軸向延伸套筒構件140及四個徑向延伸部142，其對於輓附接結構136提供支撐，套筒構件140沿輓附接結構136的中軸線延伸且其構造可旋轉式接收一概呈圓柱形軸構件144。一螺紋結件接收孔146係形成於軸構件144內，螺絲形式之一結件148構造可接收於結件接收孔146中，以將輓附接結構136(及供輓114、116)可旋轉式安裝至軸構件144，螺絲148旋緊以緊密接合板構件138及保護結構132的軸向表面，故在展開進給輓期間產生磨擦，此磨擦對輓產生制動及預拉力並防止作業期間基材超過界限，柏格森的美國臨時申請60/101,366號-其整體以提及方式併入本申請中-之制動總成可另用以制動進給輓或對其施加拉力。

匣體附接結構134包含一平面基座構件150及一對概呈平行往外延伸附接部152，匣體結構112具有四對概呈平行往內延伸附接部154，其位於安裝供輓114、116處。概呈平行往內延伸部154的內表面之間的寬度概與概呈平行往外延伸部152的外表面之間的寬度相同，這些寬度可使概呈平行往外延伸附接部152滑移於平行往內延伸部154之間(如第11圖所示)，並由適當裝置-如一黏著劑或機械結件-固定附接至該處，因此將供輓安裝結構130固定安裝至匣體結構112。各附接部152具有一階狀肩部156，其接合了相關側壁118、120，故決定往外延伸附接部152可滑入往

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

五、發明說明(14)

內延伸附接部154之深度。

第12圖顯示一疊層及黏著劑移轉裝置160之立體圖，其可使用本發明之可移除式匣110，可瞭解可移除式匣110可配合使用任何類型的黏著劑移轉裝置且其用途不限於本申請所述或提及範例。裝置160包含一架162、一進給盤164、及一出口盤166，如第13圖的剖視圖，裝置160亦包含一對軋縫滾子168、170及一匣接收開口172，一長形匣導槽174自匣接收開口172沿架結構162的各側壁176往內延伸。

如第8圖所示，匣體結構112具有配置於各側壁118、120上之一長形往外延伸引導構件178，當可移除匣110人工接合並插入匣接收開口172中時，引導構件178的構造可滑動接收於匣導槽174中，請瞭解可用其他結構來引導開口172中的匣110，實際上可能根本不需此引導構件178且為更佳。

第10圖顯示第8圖中虛線顯示的A箱之放大圖，第10圖所示元件的比例加大以更清楚顯示本發明，上供輥114具有沿一圓柱形核心(未圖示)捲繞的黏著劑罩材料之一供源，該較佳黏著劑罩材料係為一透明塑膠片180，但，可黏結黏著劑的任何類型的材料譬如紙、布料或多種不同合成材料皆可取代透明塑膠片180。下供輥116具有捲繞在一圓柱形核心(未圖示)上的差異型釋放襯墊182形式之一基底材，釋放襯墊182塗佈一層可移位黏著劑材料184，該層可移位黏著劑材料184可為黏結至一接觸表面時不會永久凝固之任何適當類型，但是，較佳對於層184採用一微滴

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

五、發明說明 (15)

型可移位黏著劑。

一層永久黏著劑186覆蓋了該層可移位黏著劑184，該永久黏著劑186係為具有適合延長使用期間之較強且耐久結合性質的類型，可瞭解該等適當材料可包括一丙烯酸乳劑黏著劑、一橡膠基黏著劑、或表現該等性質之任何其他適當材料，永久黏著劑186較佳係為壓力感應丙烯酸乳劑類型，且請注意不用熱傳而進行下述作業。

釋放襯墊182較佳係為差異型，一差異型釋放襯墊182的兩表面皆受處理以防止黏著劑材料結合至該處，釋放襯墊182較佳為差異型，因為一側比另一側受到更多處理，使得該更多處理側比較少處理側對於黏著劑具有較小親和力，處理襯墊182之一方式係以矽樹脂塗佈表面，但本發明範圍中係用其他處理釋放襯墊182之方式。本主體中，更多處理的側188係為未塗佈黏著劑材料184、186之側，因此，當在一側上塗有兩層材料184、186之釋放襯墊182捲繞在供輥116的丙烯酸核心上時，永久黏著劑材料186不會凝固並結合至釋放襯墊182的徑向往內相鄰部之更多處理的側188，在需進行一黏著劑移轉作業時，釋放襯墊182接著可易自核心展開。

易言之，當釋放襯墊182捲繞在供輥114、116的圓柱形核心上時，該層永久黏著劑材料將徑向朝內，而釋放襯墊182的處理表面188將徑向朝外，由於處理表面188具有對於黏著劑材料較差的親和力，該層永久黏著劑186捲繞在核心上時與釋放襯墊182處理表面188相接觸之部份將不

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝 訂 線

五、發明說明(16)

會結合至釋放襯墊182。對於更多處理表面188之基本需求係為：更多處理表面188與一相鄰永久黏著劑層186之間的結合，必須比可移位黏著劑層184與釋放襯墊182的塗佈側之間的結合較小，使得該輥可在適當側上展開黏著劑材料184、186。

釋放襯墊182塗有黏著劑材料184、186的釋放襯墊182側較佳類似表面188進行處理，但由於襯墊182之差異性質而為較小範圍，因為可移位黏著劑層184的性質可使其移除並重新置於另一表面上，當該層永久黏著劑186自釋放襯墊182移除時，該層184將易黏至永久黏著劑層186而非釋放襯墊182。因此，不需處理釋放襯墊182的塗佈側，但較佳仍進行處理以確使該等層的黏著劑材料184、186可自釋放襯墊182移除而不在黏著劑層184、186中產生任何不當應變。對於塗佈側的黏著親和力之基本需求為：該層可移位黏著劑184與該層永久黏著劑186之間的結合，比該層可移位黏著劑184與襯墊182之間的結合更強。

如第10圖所示，來自供輥114、116的材料在插入該裝置160的軋縫滾子168、170之前彼此靠近配置並相接觸，可移除式匣110係插入裝置160的匣接收開口，故進給開口128對於架162係呈往外。為了便利將釋放襯墊182與黏著劑罩180初始插入軋縫滾子168、170，可採用一匣啟動器，如小般塞恩之美國專利申請09/182,197號所述者，其整體以提及方式併入申請中。並且，第15圖顯示可起初使用之一匣啟動器190，匣啟動器190僅為一件塑膠、紙或瓦楞

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

五、發明說明(17)

板，在初使用可移除式匣110之前，黏至黏著劑罩180與釋放襯墊182上的永久黏著劑層186，採用匣啟動器190將不再需對下供輥116剝除釋放襯墊182以將其插在軋縫滾子168、170之間，並降低用者手部及手指對黏性黏著劑184、186的暴露。並且，採用任一個匣啟動器均有助於確使釋放襯墊182及黏著劑罩180在插入軋縫滾子168、170之前適當校準。

當可移除式匣110可移除式插入該裝置的匣接收開口172時，可接著在選定基材(未圖示)上進行一黏著劑移轉作業，該基材可為用者需可移位黏至一接觸表面之任何基材類型，譬如可能需在一名片、照片、學校課程作品、藝術及工藝作品等處進行一黏著劑移轉作業。

採用本發明的可移除式匣110之黏著劑移轉程序基本係與上述'417號、'962號或'629號專利所述之程序相同，選定的基材插入匣110的進給開口128中，以通過上及下供輥114、116之間，釋放襯墊182的該層永久黏著劑186漸接觸載有黏著劑之基材表面，黏著劑180接觸到選定基材的相對表面。釋放襯墊182、黏著劑罩180及選定基材共同進給入該裝置的軋縫滾子168、170，軋縫滾子168、170對於這些材料施壓以使該層永久黏著劑186部分足夠黏至基材，選定的基材及相對側上的釋放襯墊182與黏著劑罩180接著排出軋縫滾子168、170的排放側，位於軋縫滾子168、170的排放側上之一切割裝置192可接著切斷基材、襯墊182及罩180。

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝 · 訂 · 線

五、發明說明(18)

在選定基材、襯墊182及罩180已切斷之後，黏著劑罩180可接著剝回露出基材及釋放襯墊182未受基材覆蓋之部份，由於罩180對於黏著結合的親和力，永久黏著劑材料186未受選定基材覆蓋的部份將黏至該罩180並剝離釋放襯墊182，該可移位層184未受基材覆蓋之部份亦保持結合至永久黏著劑186並隨黏著劑罩180剝離釋放襯墊182，接著該罩180可隨黏至該處的剝除黏著劑材料184、186棄置，此作業階段留下的部份僅為選定基材及釋放襯墊182及黏著劑材料184、186受其間配置的選定基材覆蓋的部份，用者接著自釋放襯墊182移除了選定基材，該層永久黏著劑186受基材覆蓋的部份及該層可移位黏著基材184受基材覆蓋的部份將保持結合至選定基材的表面。

成品將有一層永久黏著劑材料直接結合至其背部、及一層可移位黏著劑材料結合至該層永久黏著劑材料，此黏著劑材料的配置使得基材可移位式黏至任何所需接觸表面，並在隨後某時間自該接觸表面移除，並可移位式黏在一不同接觸表面上。因為可移位黏著劑材料係由一層永久黏著劑材料結合至基材，可移位黏著劑材料將在重新置放其間而非留在一接觸表面上期間保持結合至選定基材。

由上文描述可知，採用本發明的可移除式黏著劑移轉匣連同一黏著劑移轉裝置係為一種比利用刷或噴瓶將液體黏著劑人工施至原片背部更容易且簡單的作業。並且，採用本發明的匣110進行一黏著劑移轉作業，避免了使用液體黏著劑時常發生的潛在洩漏，事實上，採用黏著劑罩180

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

五、發明說明(19)

可使作業員在自釋放襯墊182移除之後更易將其坍塌棄置，故實際避免與黏著劑材料184、186的人工接觸，因此，採用本發明的匣比起迄今所知方式提供一種更清潔且更簡單之可移位基材製法。

第16圖顯示本發明之另一實施例，第16圖的黏著劑旋轉裝置200具有類似習知裝填帶分配器之構造，該裝置200包括具有一可人工接合握柄部204之一架202，該架202具有一對分隔的側壁204，一概呈圓柱形核心206係可旋轉式安裝於側壁204之間，核心204以套筒方式配合在徑向延伸安裝結構210中，且安裝結構係由一對螺紋殼212可旋轉式固定至架202。

類似於上述實施例所用者之一底基材208係為差異性釋放型，其在一側上具有一釋放表面214，如上述實施例中，底基材208塗佈一層可移位黏著劑及一層永久黏著劑，先前已描述黏著劑層的細節及其裝置而不贅述，基材208捲繞在核心206上，故釋放表面214相對於核心206概徑向往外，而永久黏著劑層相對於該核心206徑向往內，故永久黏著劑層可移除式接合該釋放表面214。

釋放表面214的性質使得底基材208的自由端部216可自基材展開並移離底基材208的徑向往內相鄰部218之釋放表面214，將黏著劑層留在自由部216上而露出永久黏著劑層，藉由接合該層與選定基材並對基材208施加足以影響黏著劑結合的壓力，用者接著黏結由自由端部216所承載的永久黏著劑層，可直接由用者手部或將裝置200之一撓

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝 · 訂 · 線

五、發明說明(20)

性擦拭部220與底基材208相接合而施壓。

用者接著使架202相對於選定基材移動，以沿對應部份的選定基材配送了一段長度的底基材208，沿展開長度的底基材208之永久黏著劑層部份係接合了對應部份的選定基材，並將足以影響黏著劑結合之壓力施加至底基材208而黏結至對應選定基材部，裝置200移除時可用手部或以擦拭部220施壓。

接著可切斷該展開長度的底基材208，可由刀具或剪刀、如習知裝填帶分配器上提供的刃部(未圖示)、或人工撕裂底基材208而進行切斷。底基材208隨後可移開該選定基材而將黏著劑層留在選定基材上，露出可移位黏著劑層，此型裝置200對產生大型可移位窗標示特別有效。

在所有上述實施例中，永久黏著劑層的厚度及性質較佳使得永久黏著劑層可固定黏結至紋理表面如布料或毯料。可移位黏著劑對於永久黏著劑的重量比值較佳至少為1:1，當採用其間無中介層而直接彼此結合之黏著劑層時，保持在此低限比值以上將確使該永久及可移位黏著劑不會相混合到永久黏著劑克服可移位黏著劑並產生具永久黏著特徵的一混合層之程度。當採用此直接結合裝置並保持在較低重量比值低限以上、而組合的黏著劑層具有大於20克每平方公尺的密度時，已知永久黏著劑層將結合至紋理表面。當組合密度增加時，永久黏著劑層的結合能量亦增加，已知對於可移位黏著劑層採用一微滴型黏著劑及一丙烯酸乳劑基之永久黏著劑時，大於25克每平方公尺以上的

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

五、發明說明 (21)

密度係為較佳、且約27克每平方公尺為最佳，27克每平方公尺以上的密度係為較佳，因為其在穩固結合與成本效益之間具有一最佳平衡。

因此可瞭解：已完全且有效地達成本發明的目的，已提供上述詳細實施例來顯示本發明的功能性及結構性原理，並無意受到限制，相反地，本發明用於涵蓋申請專利範圍的範疇及精神中之所有修改、變更及替代方式。

元件標號對照

10: 黏著劑移轉板塊	112: 匣體結構
12,30,50: 黏著劑移轉片	114: 上供輥
14,34,52,208: 底基材	116: 下供輥
16,32,54,184: 可移位黏著劑	118,120: 側壁
18,36,56,186: 永久黏著劑	122: 上壁
20,38,182: 釋放襯墊	124: 下壁
21,39: 刻線	126: 後壁
22,60,214: 釋放表面	128: 基材進給開口
24,180: 透明塑膠片	130,210: 安裝結構
26: 選定基材或原片	132: 保護結構
58: 基材	134: 匣體附接結構
62: 剝除表面	136: 輥附接結構
110: 可移除式匣	138: 板構件

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

五、發明說明(22)

- | | |
|------------------|--------------|
| 144: 軸構件 | 174: 匣導槽 |
| 148: 螺絲 | 176: 側壁 |
| 150: 平面基座構件 | 178: 引導構件 |
| 152: 往外延伸附接部 | 182: 差異型釋放襯墊 |
| 154: 往內延伸附接部 | 188: 側 |
| 156: 階狀肩部 | 188: 處理表面 |
| 160,200: 黏著劑移轉裝置 | 190: 匣啟動器 |
| 162,202: 架 | 204: 側壁 |
| 164: 進給盤 | 206: 核心 |
| 166: 出口盤 | 212: 螺紋殼 |
| 168,170: 軋縫滾子 | 216: 自由端部 |
| 172: 匣接收開口 | 218: 相鄰部 |

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

90.11.13 修正 A5
年 月 日 補充 B5

四、中文發明摘要(發明之名稱：

用以製造可移位黏性基材之黏著劑移轉裝置

本發明有關一種黏著劑移轉裝置，用於由一選定基材選擇性製造一可移位黏著基材，該裝置包含一底基材、一層壓力感應可移位黏著劑配置於底基材上、一層壓力感應永久黏著劑配置鄰近與底基材相對之可移位黏著劑層、及提供一釋放表面之結構。該釋放表面係可移除式接合與可移位黏著劑層及底基材相對之該永久黏著劑層，以覆蓋該永久黏著劑層，釋放表面的性質使得底基材與提供釋放表面的結構可彼此移開，以使釋放表面自永久黏著劑層脫離並將兩黏著劑層留在底基材上而露出永久黏著劑層，故可使選定基材黏結至露出的永久黏著劑層。提供該黏著劑層

(接下頁)

英文發明摘要(發明之名稱：

ADHESIVE TRANSFER DEVICE FOR MAKING
REPOSITIONABLY ADHEREABLE SUBSTRATE

The present invention relates to an adhesive transfer device for selectively making a repositionably adherable substrate from a selected substrate. The device comprises a base substrate, a layer of pressure-sensitive repositionable adhesive disposed on the base substrate, a layer of pressure-sensitive permanent adhesive disposed adjacent to the repositionable adhesive layer opposite the base substrate, and structure providing a release surface. The release surface is removably engaged with the permanent adhesive layer opposite the repositionable adhesive layer and the base substrate so as to cover the permanent adhesive layer. The nature of the release surface is such that the base substrate and the structure providing the release surface can be moved apart from one another so as to separate the release surface from the permanent adhesive layer and leave both of the adhesive layers on the base substrate with the permanent adhesive layer exposed, thereby enabling the selected substrate to be adhesively bonded to the exposed permanent adhesive layer. The adhesive layers are provided such that, after the selected substrate has been adhesively bonded to the permanent adhesive layer, the base substrate and the selected substrate can be moved apart from one another so as to separate the base substrate from the repositionable adhesive layer and leaving both the adhesive layers on the selected substrate with the repositionable adhesive layer exposed, thereby allowing the selected substrate to be repositionably adhered to a contact surface by engaging the exposed repositionable adhesive layer with the contact surface. A number of various devices embodying the principles of the present invention are disclosed in the present application, including a tablet having a plurality of adhesive transfer sheets, an adhesive transfer cartridge for use with an adhesive transfer apparatus, and a dispenser for dispensing a length of the base substrate.

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁各欄)

裝

訂

四、中文發明摘要(發明之名稱:)

(承上頁)

使得在選定基材已黏結至永久黏著劑層之後，底基材及選定基材可彼此移開，以與底基材自可移位黏著劑層分離，並將兩黏著劑留在選定基材上並露出可移位黏著劑層，故可藉由露出的可移位黏著劑層與接觸表面相接合，而使選定基材可移位黏至一接觸表面。本申請案揭示了實施本發明原理的多種不同裝置，其中包括含有多數黏著劑移轉片之一板塊、配合黏著劑移轉裝置使用之一黏著劑移轉匣、及用於配送一段底基材長度之一分配器。

英文發明摘要(發明之名稱:)

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁各欄)

裝

訂

線

六、申請專利範圍

第88111106號專利申請案 申請專利範圍修正本 修正日期：90年11月

1. 一種黏著劑移轉裝置，用於由一選定基材選擇性製造一可移位黏著基材，該裝置包含：

一底基材；

一層壓力感應可移位黏著劑，配置於底基材上；

一層壓力感應永久黏著劑，配置於鄰近與該底基材相對的該可移位黏著劑層；及

提供一釋放表面之結構，該釋放表面係可移除式接合與可移位黏著劑層及該底基材相對之該永久黏著劑層，以覆蓋該永久黏著劑層；

該釋放表面的性質使得該底基材及提供釋放表面的該結構可彼此移開，以使該釋放表面自該永久黏著劑層脫離，並將兩該等黏著劑層留在該底基材上而露出該永久黏著劑層，故可藉由該露出的永久黏著劑層與該選定基材相接合，而使該選定基材黏結至該露出的永久黏著劑層；

提供該等黏著劑層，使得在該選定基材已黏結至該永久黏著劑層之後，該底基材及該選定基材可彼此移開，以使該底基材自該可移位黏著劑層分離，並將兩該等黏著劑層留在選定基材上並露出該可移位黏著劑層，故可使選定基材(a)藉由該露出的可移位黏著劑層與接觸表面相接合而可移位式黏至一接觸表面及(b)隨後自接觸表面移除並可移位式黏結至另一接觸表面。

2. 如申請專利範圍第1項之黏著劑移轉裝置，其中該永久黏著劑層的厚度與性質，使得該永久黏著劑層可固定黏結

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

訂

六、申請專利範圍

至設有一紋理表面之一選定基材。

3. 如申請專利範圍第2項之黏著劑移轉裝置，其中該黏著劑層其間並無中介層而直接彼此相結合，且該可移位黏著劑層對於該永久黏著劑層的重量比值大於1:1。

4. 如申請專利範圍第3項之黏著劑移轉裝置，其中該黏著劑層具有大於20克每平方公尺之一組合密度。

5. 如申請專利範圍第4項之黏著劑移轉裝置，其中該可移位黏著劑係為一丙烯酸微滴型黏著劑。

6. 如申請專利範圍第5項之黏著劑移轉裝置，其中該黏著劑層具有大於25克每平方公尺之組合密度。

7. 如申請專利範圍第6項之黏著劑移轉裝置，其中該黏著劑層之組合密度為27克每平方公尺。

8. 如申請專利範圍第1項之黏著劑移轉裝置，其中該永久黏著劑係為一丙烯酸基的乳劑。

9. 如申請專利範圍第1項之黏著劑移轉裝置，其中該可移位黏著劑係為一丙烯酸微滴型黏著劑。

10. 如申請專利範圍第1項之黏著劑移轉裝置，其中界定了該釋放表面的該結構係為一釋放襯墊基材，

該釋放襯墊基材、該底基材與該等黏著劑層大體上呈平坦之平行關係配置，以界定一黏著劑移轉片。

11. 如申請專利範圍第10項之黏著劑移轉裝置，其進一步包含一黏著劑罩基材，其位置鄰近與該黏著劑層相對之該釋放襯墊基材，該黏著劑罩基材的性質使得在釋放襯墊基材已從該底基材移開，以使該釋放表面自該永久黏著劑層

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

六、申請專利範圍

分離，且選定基材已黏結至該永久黏著劑層之後，但在選定基材已自該底基材移開，以使該底基材自該可移位黏著劑層分離之前，該黏著劑單基材可以覆蓋關係位於選定基材上方，而一部份黏著劑基材單接合了選定基材，而一部份黏著劑基材單接合了永久黏著劑層露出選定基材周圍的周圍部份，故該永久黏著劑層的周圍部份結合至該黏著劑基材單的方式使得該黏著劑基材單隨後可移開該底基材及選定基材，以使永久黏著劑層的周圍部份及該可移位黏著劑層之對應的周圍部份自該底基材移除，因此將選定基材留在該底基材上，其間配置有永久黏著劑及可移位黏著劑層的部份，並大體上無黏著劑沿選定基材的周圍配置於該底基材上。

12. 如申請專利範圍第10項之黏著劑移轉裝置，其中該釋放襯墊具有與該釋放表面相對之一剝除表面，其對於黏著劑結合具有比起該釋放表面較高之一親和力，該等剝除表面的性質使得在釋放襯墊已經移開該底基材以使該釋放表面自該永久黏著劑層分離且選定基材已黏結至該永久黏著劑層之後，但在選定基材已經移開該底基材以使該底基材自該可移位黏著劑層分離之前，該釋放襯墊基材可以覆蓋關係重新定向並定位在選定基材中，其中一部份剝除表面接合了選定基材，而一部份剝除表面接合了永久黏著劑層露出選定基材的周圍之周圍部份，故該永久黏著劑層的周圍部份結合至該剝除表面的方式使得該釋放襯墊可隨後移開該底基材及選定基材，以將永久黏著劑層的周圍部份及

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

訂

泉

六、申請專利範圍

該可移位黏著劑層之對應的周圍部份自該底基材移除，因此將選定基材留在該底基材上，其間配置有永久及可移位黏著劑層，且在選定基材周圍部份的該底基材上大體上無配置黏著劑。

13. 如申請專利範圍第10項之黏著劑移轉裝置，其進一步包含多數合併的該等黏著劑移轉片。

14. 如申請專利範圍第13項之黏著劑移轉裝置，其中各該等黏著劑移轉片大體上呈長方型。

15. 如申請專利範圍第10項之黏著劑移轉裝置，其中該永久黏著劑層的厚度與性質使得該永久黏著劑層可穩固黏結至具有一紋理表面之選定基材。

16. 如申請專利範圍第15項之黏著劑移轉裝置，其中該黏著劑層直接彼此相結合，且其間無中介層，其中該可移位黏著劑層重量對於該永久黏著劑層重量之一重量比值大於1:1。

17. 如申請專利範圍第16項之黏著劑移轉裝置，其中該等黏著劑層具有大於20克每平方公尺之一組合密度。

18. 如申請專利範圍第17項之黏著劑移轉裝置，其中該可移位黏著劑係為一丙烯酸微滴型黏著劑。

19. 如申請專利範圍第18項之黏著劑移轉裝置，其中該組合密度係大於25克每平方公尺。

20. 如申請專利範圍第19項之黏著劑移轉裝置，其中該組合密度為27克每平方公尺。

21. 如申請專利範圍第10項之黏著劑移轉裝置，其中該永

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

六、申請專利範圍

久黏著劑係為一丙烯酸基的乳劑。

22. 如申請專利範圍第10項之黏著劑移轉裝置，其中該可移位黏著劑係為一丙烯酸微滴型黏著劑。

23. 如申請專利範圍第1項之黏著劑移轉裝置，其進一步包含一大體上呈圓柱形核心，且其中該界定該釋放表面的結構係為與該黏著劑層相對之該底基材的一表面，

該底基材捲繞在該核心上使得該釋放表面係面向相對於該核心大體上呈徑向往外，而該等黏著劑層相對於該核心大體上呈徑向往內，且其中該永久黏著劑層可移除式接合該釋放表面，

該釋放表面的性質使得該底基材的一自由端部可展開並移離該底基材之一徑向往內相鄰部的釋放表面，以使該永久黏著劑層自該底基材的徑向往內相鄰部的釋放表面分離，並將兩該等黏著劑層留在該底基材的自由端部上而露出該永久黏著劑層，因此藉由選定基材與該永久黏著劑層的接合，可使選定基材黏結至該露出的永久黏著劑層。

24. 如申請專利範圍第23項之黏著劑移轉裝置，其進一步包含：

一架，具有一可人工接合握柄部，

該核心可旋轉式安裝至該架，使得一用者可展開該底基材的自由端部並由下列方式將黏著劑層施加至選定基材 (a)接合該暴露的永久黏著劑層與選定基材，並將該永久黏著劑層黏結至選定基材，(b)接著相對該選定基材移動該架，以沿一對應部份配送一對長度的該底基材，並將與配送

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

訂

六、申請專利範圍

長度相聯之暴露的永久黏著劑層黏結至對應部份的選定基材，及(c)隨後將配送長度的該底基材移離選定基材，以使配送長度的該底基材自該層可移位黏著劑分離，並將兩該等黏著劑層留在選定基材上而露出該可移位黏著劑層。

25. 如申請專利範圍第24項之黏著劑移轉裝置，其進一步包含安裝於該架之一擦拭部元件，由於底基材係自該裝置配送且該處相聯的永久黏著劑層黏結至選定基材，該擦拭部元件的構造與配置可對底基材施壓。

26. 如申請專利範圍第1項之黏著劑移轉裝置，其配合使用一黏著劑移轉裝置，其中包含一架、安裝於該架之一對配合結構、及一引動器用以引動一或兩個該等配合結構，該裝置進一步包含：

一匣體，其構造與配置係可移除式安裝至該裝置架，

一對大體上呈圓柱形核心，可旋轉式安裝至該匣體；

該釋放表面，係由與該等黏著劑層相對之該底基材的一表面所提供，

該底基材捲繞在一第一之該等核心上，使得該釋放表面相對於該第一核心大體上呈徑向往外，而該等黏著劑層相對於該第一核心大體上呈徑向往內，其中該永久黏著劑層係可移除式接合該釋放表面，

該釋放表面的性質使得該底基材之一自由端部可展開並移離該底基材的一徑向往內相鄰部的釋放表面，以使該永久黏著劑層自該底基材的徑向往內相鄰部的釋放表面分離，並將兩該等黏著劑層留在該底基材的自由端上而露出

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

六、申請專利範圍

該永久黏著劑層，因此藉由選定基材與該露出的永久黏著劑層相接合，可使選定基材能黏結至該露出的永久黏著劑層，

一黏著劑罩，捲繞在一第二該等核心上，該黏著劑罩基材對於黏著劑結合，比起該釋放表面具有一較高的親和力；

該匣體的構造及配置使得當該匣體可移除式安裝至該裝置架時，選定基材可進給於該等核心之間並進入配合結構中，其中底基材自該第一核心展開並配置於選定基材的一側上，且該處的永久黏著劑層面向選定基材及展開且配置在選定基材另一側上之黏著劑罩，使得裝置引動器可隨後人工作業以操作一或兩個配合結構進行一黏著劑移轉程序，其中配合結構相配合以對該等基材施壓，而將一部份永久黏著劑層黏結至選定基材，而該永久黏著劑層的一周圍部份沿選定基材的周圍延伸至該黏著劑罩基材，並接著將處理後的基材自該處往外排放，

該黏著劑罩基材及該等黏著劑層的性質使得該等基材已排出該裝置之後，該黏著劑罩基材可隨後移離該底基材及選定基材，以將永久黏著劑層的周圍部份及該可移位黏著劑層之對應周圍部份自該底基材移除，因此將選定基材留在該底基材上，其間配置有部份永久及可移位黏著劑層，且大體上無黏著劑配置於選定基材的周圍之該底基材上。

27. 如申請專利範圍第26項之黏著劑移轉裝置，其中該匣

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

訂

原

六、申請專利範圍

體具有一頂壁、一底壁、及延伸於該頂壁與底壁間之一對側壁。

28. 如申請專利範圍第27項之黏著劑移轉裝置，其中該匣體具有延伸於該等壁之間的一後壁，該後壁具有通過形成之一開口，可供選定基材通過進給入該裝置中。

29. 如申請專利範圍第28項之黏著劑移轉裝置，其中該等第一及第二核心為瓦楞板。

30. 如申請專利範圍第23項之黏著劑移轉裝置，其中該永久黏著劑層的厚度與性質使得該永久黏著劑層可穩固黏結至具有一紋理表面之一選定基材。

31. 如申請專利範圍第30項之黏著劑移轉裝置，其中該等黏著劑層直接彼此相結合，且其間無中介層，其中該可移位黏著劑層重量對於該永久黏著劑層重量之一重量比值大於1:1。

32. 如申請專利範圍第31項之黏著劑移轉裝置，其中該等黏著劑層具有大於20克每平方公尺之一組合密度。

33. 如申請專利範圍第32項之黏著劑移轉裝置，其中該可移位黏著劑係為一丙烯酸微滴型黏著劑。

34. 如申請專利範圍第33項之黏著劑移轉裝置，其中該組合密度大於25克每平方公尺。

35. 如申請專利範圍第34項之黏著劑移轉裝置，其中該組合密度為27克每平方公尺。

36. 如申請專利範圍第23項之黏著劑移轉裝置，其中該永久黏著劑為一丙烯酸基的乳劑。

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

六、申請專利範圍

37. 如申請專利範圍第23項之黏著劑移轉裝置，其中該可移位黏著劑為一丙烯酸微滴型黏著劑。

38. 一種黏著劑移轉裝置，用於由一選定基材選擇性製造一可移位黏著基材，該裝置包含：

一底基材；

一層壓力感應可移位黏著劑，配置於底基材上；

一層壓力感應永久黏著劑，配置於鄰近與該底基材相對的該可移位黏著劑層；該等黏著劑層被直接其間並無中介層而直接彼此相結合，該黏著劑層具有大於25克每平方公尺之一組合密度且該可移位黏著劑層對於該永久黏著劑層的重量比值大於2:1；以及

提供一釋放表面之結構，該釋放表面係可移除式接合與可移位黏著劑層及該底基材相對之該永久黏著劑層，以覆蓋該永久黏著劑層；

該釋放表面的性質使得該底基材及提供釋放表面的該結構可彼此移開，以使該釋放表面自該永久黏著劑層脫離，並將兩該等黏著劑層留在該底基材上而露出該永久黏著劑層，故可藉由該露出的永久黏著劑層與該選定基材相接合，而使該選定基材黏結至該露出的永久黏著劑層；

提供該等黏著劑層，使得在該選定基材已黏結至該永久黏著劑層之後，該底基材及該選定基材可彼此移開，以使該底基材自該可移位黏著劑層分離，並將兩該等黏著劑層留在選定基材上並露出該可移位黏著劑層，故可使選定基材(a)藉由該露出的可移位黏著劑層與接觸表面相接合

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

訂

六、申請專利範圍

而可移位式黏至一接觸表面及(b)隨後自接觸表面移除並可移位式黏結至另一接觸表面。

39. 如申請專利範圍第38項之黏著劑移轉裝置，其中該可移位黏著劑係為一丙烯酸微滴型黏著劑。

40. 如申請專利範圍第39項之黏著劑移轉裝置，其中該黏著劑層之組合密度為27克每平方公尺。

41. 如申請專利範圍第38項之黏著劑移轉裝置，其中該永久黏著劑係為一丙烯酸基的乳劑。

42. 如申請專利範圍第38項之黏著劑移轉裝置，其中該可移位黏著劑係為一丙烯酸微滴型黏著劑。

43. 如申請專利範圍第38項之黏著劑移轉裝置，其中界定了該釋放表面的該結構係為一釋放襯墊基材，

該釋放襯墊基材、該底基材與該黏著劑層大體上呈平坦之平行關係配置，以界定一黏著劑移轉片。

44. 如申請專利範圍第43項之黏著劑移轉裝置，其進一步包含一黏著劑罩基材，其位置鄰近與該黏著劑層相對之該釋放襯墊基材，該黏著劑罩基材的性質使得在釋放襯墊基材已從該底基材移開，以使該釋放表面自該永久黏著劑層分離，且選定基材已黏結至該永久黏著劑層之後，但在選定基材已自該底基材移開，以使該底基材自該可移位黏著劑層分離之前，該黏著劑罩基材可以覆蓋關係位於選定基材上方，而一部份黏著劑基材罩接合了選定基材，而一部份黏著劑基材罩接合了永久黏著劑層露出選定基材周圍的周圍部份，因此該永久黏著劑層的周圍部份結合至該黏著

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

六、申請專利範圍

劑基材罩的方式使得該黏著劑基材罩隨後可移開該底基材及選定基材，以使永久黏著劑層的周圍部份及該可移位黏著劑層之對應的周圍部份自該底基材移除，因此將選定基材留在該底基材上，其間配置有永久黏著劑及可移位黏著劑層的部份，並大體上無黏著劑沿選定基材的周圍配置於該底基材上。

45. 如申請專利範圍第43項之黏著劑移轉裝置，其中該釋放襯墊具有與該釋放表面相對之一剝除表面，其對於黏著劑結合具有比起該釋放表面較高之一親和力，該等剝除表面的性質使得在釋放襯墊已經移開該底基材以使該釋放表面自該永久黏著劑層分離且選定基材已黏結至該永久黏著劑層之後，但在選定基材已經移開該底基材以使該底基材自該可移位黏著劑層分離之前，該釋放襯墊基材可以覆蓋關係重新定向並定位在選定基材中，其中一部份剝除表面接合了選定基材，而一部分剝除表面接合了永久黏著劑層露出選定基材的周圍之周圍部份，故該永久黏著劑層的周圍部份結合至該剝除表面的方式使得該釋放襯墊可隨後移開該底基材及選定基材，以將永久黏著劑層的周圍部份及該可移位黏著劑層之對應的周圍部份自該底基材移除，因此將選定基材留在該底基材上，其間配置有永久及可移位黏著劑層，且在選定基材周圍部份的該底基材上大體上無配置黏著劑。

46. 如申請專利範圍第43項之黏著劑移轉裝置，進一步包含多數合併的該等黏著劑移轉片。

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

訂

錄

六、申請專利範圍

47. 如申請專利範圍第46項之黏著劑移轉裝置，其中各該等黏著劑移轉片大體上呈長方型。

48. 如申請專利範圍第43項之黏著劑移轉裝置，其中該可移位黏著劑係為一丙烯酸微滴型黏著劑。

49. 如申請專利範圍第48項之黏著劑移轉裝置，其中該組合密度為27克每平方公尺。

50. 如申請專利範圍第43項之黏著劑移轉裝置，其中該永久黏著劑係為一丙烯酸基的乳劑。

51. 如申請專利範圍第43項之黏著劑移轉裝置，其中該可移位黏著劑係為一丙烯酸微滴型黏著劑。

52. 如申請專利範圍第38項之黏著劑移轉裝置，進一步包含一大體上呈圓柱形核心，且其中該界定該釋放表面的結構係為與該黏著劑層相對之該底基材的一表面，

該底基材捲繞在該核心上使得該釋放表面係面向相對於該核心大體上呈徑向往外，而該等黏著劑層相對於該核心大體上呈徑向往內，且其中該永久黏著劑層可移除式接合該釋放表面，

該釋放表面的性質使得該底基材的一自由端部可展開並移離該底基材之一徑向往內相鄰部的釋放表面，以使該永久黏著劑層自該底基材的徑向往內相鄰部的釋放表面分離，並將兩該等黏著劑層留在該底基材的自由端部上而露出該永久黏著劑層，因此藉由選定基材與該永久黏著劑層的接合，可使選定基材黏結至該露出的永久黏著劑層。

53. 如申請專利範圍第52項之黏著劑移轉裝置，進一步包

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

六、申請專利範圍

含：

一架，具有一可人工接合握柄部，

該核心可旋轉式安裝至該架，使得一用者可展開該底基材的自由端部並由下列方式將黏著劑層施加至選定基材
(a)接合該暴露的永久黏著劑層與選定基材，並將該永久黏著劑層黏結至選定基材，(b)接著相對該選定基材移動該架，以沿一對應部份配送一對長度的該底基材，並將與配送長度相聯之暴露的永久黏著劑層黏結至對應部份的選定基材，及(c)隨後將配送長度的該底基材移離選定基材，以使配送長度的該底基材自該層可移位黏著劑分離，並將兩該等黏著劑層留在選定基材上而露出該可移位黏著劑層。

54. 如申請專利範圍第53項之黏著劑移轉裝置，進一步包含安裝於該架之一擦拭部元件，由於底基材係自該裝置配送且該處相聯的永久黏著劑層黏結至選定基材，該擦拭部元件的構造與配置可對底基材施壓。

55. 如申請專利範圍第38項之黏著劑移轉裝置，其配合使用一黏著劑移轉裝置，其中包含一架、安裝於該架之一對配合結構、及一引動器用以引動一或兩個該等配合結構，該裝置進一步包含：

一匣體，其構造與配置係可移除式安裝至該裝置架，

一對大體上呈圓柱形核心，可旋轉式安裝至該匣體；
該釋放表面，係由與該等黏著劑層相對之該底基材的一表面所提供，

該底基材捲繞在一第一之該等核心上，使得該釋放表

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

訂

錄

六、申請專利範圍

面相對於該第一核心大體上呈徑向往外，而該等黏著劑層相對於該第一核心大體上呈徑向往內，其中該永久黏著劑層係可移除式接合該釋放表面，

該釋放表面的性質使得該底基材之一自由端部可展開並移離該底基材的一徑向往內相鄰部的釋放表面，以使該永久黏著劑層自該底基材的徑向往內相鄰部的釋放表面分離，並將兩該等黏著劑層留在該底基材的自由端上而露出該永久黏著劑層，因此藉由選定基材與該露出的永久黏著劑層相接合，可使選定基材能黏結至該露出的永久黏著劑層，

一黏著劑罩，捲繞在一第二該等核心上，該黏著劑罩基材對於黏著劑結合，比起該釋放表面具有一較高的親和力；

該匣體的構造及配置使得當該匣體可移除式安裝至該裝置架時，選定基材可進給於該等核心之間並進入配合結構中，其中底基材自該第一核心展開並配置於選定基材的一側上，且該處的永久黏著劑層面向了選定基材及展開且配置在選定基材另一側上之黏著劑罩，使得裝置引動器可隨後人工作業以操作一或兩個配合結構進行一黏著劑移轉程序，其中配合結構相配合以對該等基材施壓，而將一部份永久黏著劑層黏結至選定基材，而該永久黏著劑層的一周圍部份沿選定基材的周圍延伸至該黏著劑罩基材，並接著將處理後的基材自該處往外排放，

該黏著劑罩基材及該等黏著劑層的性質係使得該等基

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

六、申請專利範圍

材已排出該裝置之後，該黏著劑罩基材可隨後移離該底基材及選定基材，以將永久黏著劑層的周圍部份及該可移位黏著劑層之對應周圍部份自該底基材移除，因此將選定基材留在該底基材上，其間配置有部份永久及可移位黏著劑層，且大體上無黏著劑配置於選定基材的周圍之該底基材上。

56. 如申請專利範圍第55項之黏著劑移轉裝置，其中該匣體具有一頂壁、一底壁、及延伸於該頂壁與底壁間之一對側壁。

57. 如申請專利範圍第56項之黏著劑移轉裝置，其中該匣體具有延伸於該等壁之間的一後壁，該後壁具有通過形成之一開口，可供選定基材通過進給入該裝置中。

58. 如申請專利範圍第57項之黏著劑移轉裝置，其中該等第一及第二核心為瓦楞板。

59. 如申請專利範圍第52項之黏著劑移轉裝置，其中該可移位黏著劑係為一丙烯酸微滴型黏著劑。

60. 如申請專利範圍第59項之黏著劑移轉裝置，其中該組合密度為27克每平方公尺。

61. 如申請專利範圍第52項之黏著劑移轉裝置，其中該永久黏著劑為一丙烯酸基的乳劑。

62. 如申請專利範圍第52項之黏著劑移轉裝置，其中該可移位黏著劑為一丙烯酸微滴型黏著劑。

63. 一種黏著劑移轉裝置，用於由一選定基材選擇性製造一可移位黏著基材，該裝置包含：

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

訂

錄

六、申請專利範圍

一核心；

一底基材，具有一黏著劑攜帶表面以及與該黏著劑攜帶表面相對的一釋放表面；

提供一可移位黏著劑層於該底基材之黏著劑攜帶表面上；

提供一永久黏著劑層鄰接於該基材相對之可移位黏著劑層；以及

該底基材捲繞在該核心上使得該釋放表面對於該核心為第一大體上呈徑向，且該等黏著劑層對於該核心為第二大體上呈徑向，相對於該第一大體上呈徑向該釋放表面係可移除式接合該永久黏著劑層；

該釋放表面的性質使得該底基材能鬆開分離該釋放表面以及該永久黏著劑層與兩該等黏著劑層留在該底基材上而露出該永久黏著劑層，因此藉由選定基材與該以露出的永久黏著劑層之接合，可使該選定基材因而黏結至該已露出的永久黏著劑層；

提供該等黏著劑層，使得在選定基材已被黏結至該永久黏著劑層之後，該底基材及該選定之基材可彼此移開，以使該底基材自該可移位黏著劑層分離，並將兩該等黏著劑層留在選定之基材上並露出該可移位黏著劑層，故可使選定基材(a)藉由該露出的可移位黏著劑層與接觸表面相接合而可移位式黏至一接觸表面及(b)隨後自接觸表面移除並可移位式黏結至另一接觸表面。

64. 如申請專利範圍第63項之黏著劑移轉裝置，其進一步

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

六、申請專利範圍

包含：

一架，具有一可人工接合握柄部，

該核心可旋轉式安裝至該架，使得一用者自該核心展開的該底基材之一端部並由下列方式將黏著劑層施加至選定基材(a)在展開的底基材上接合該暴露的永久黏著劑層與選定基材，並將該接合的永久黏著劑層黏結至選定基材，(b)接著相對該選定基材移動該架，以便該底基材額外的部分自該核心展開，其藉由該額外部分上的永久黏著劑層露出且接合並黏著至該選定基材。

65. 如申請專利範圍第64項之黏著劑轉移裝置，其進一步包含一施壓元件安裝於該架上，構成與排列該施壓元件以施壓至該底基材之部分即與該選定基材接合，以保證該結合的永久黏著劑層黏接至該選定基材。

66. 如申請專利範圍第63項之黏著劑轉移裝置，其中該永久黏著劑層的厚度與性質使得該永久黏著劑層可穩固黏結至具有一紋理表面之一選定基材。

67. 如申請專利範圍第66項之黏著劑轉移裝置，其中該等黏著劑層直接彼此相結合，且其間無中介層，其中該可移位黏著劑層重量對於該永久黏著劑層重量之一重量比值大於1:1。

68. 如申請專利範圍第67項之黏著劑轉移裝置，其中該等黏著劑層具有大於20克每平方公尺之一組合密度。

69. 如申請專利範圍第68項之黏著劑轉移裝置，其中該可移位黏著劑係為一丙烯酸微滴型黏著劑。

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

訂

六、申請專利範圍

70. 如申請專利範圍第69項之黏著劑移轉裝置，其中該組合密度大於25克每平方公尺。
71. 如申請專利範圍第70項之黏著劑移轉裝置，其中該組合密度為27克每平方公尺。
72. 如申請專利範圍第63項之黏著劑移轉裝置，其中該永久黏著劑為一丙烯酸基的乳劑。
73. 如申請專利範圍第63項之黏著劑移轉裝置，其中該可移位黏著劑為一丙烯酸微滴型黏著劑。
74. 如申請專利範圍第63項之黏著劑移轉裝置，其中該第一大體上呈徑向相對於該核心為向內以及其中該第二大體上呈徑向相對於該核心為外。
75. 如申請專利範圍第64項之黏著劑移轉裝置，其中該架包含一可容易用手操作該架之握柄部。
76. 如申請專利範圍第63項之黏著劑移轉裝置，其中該核心呈圓柱形。
77. 如申請專利範圍第74項之黏著劑移轉裝置，其中該核心為該裝置中之唯一核心。
78. 如申請專利範圍第77項之黏著劑移轉裝置，且其中該底基材前述的部分即自該核心展開的部分為該底基材的自由端部。
79. 一種黏著劑移轉裝置，其配合使用一黏著劑移轉裝置包含一架以及安裝於該架之一對配合結構，該配合結構用於由一選定基材選擇性製造一可移位黏著基材，該裝置包含：

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

六、申請專利範圍

一匣體，其構造與配置係可移除式安裝至該裝置架，

一對核心，可旋轉式安裝至該匣體；

一底基材，具有一黏著劑攜帶表面以及一相對於該黏著劑攜帶表面之釋放表面；

提供一永久黏著劑層，其鄰接於相對該底基材之可移位黏著劑層；

該底基材該底基材捲繞在一第一之該等核心上，使得該釋放表面相對於該第一核心大體上呈一第一徑向，且該等黏著劑層相對於該第一核心大體上呈一第二徑向，其中該永久黏著劑層係可移除式接合該釋放表面，

該釋放表面的性質使得該底基材之一自由端部可展開且移離該底基材的一徑向往內相鄰部的釋放表面，以使該永久黏著劑層自該底基材的徑向往內相鄰部的釋放表面分離，並將兩該等黏著劑層留在該底基材的自由端上而露出該永久黏著劑層，因此藉由選定基材與該露出的永久黏著劑層相接合，可使選定基材能黏結至該露出的永久黏著劑層；

一黏著劑罩，捲繞在一第二該等核心上，該黏著劑罩基材對於黏著劑結合，比起該釋放表面具有一較高的親和力；

該匣體的構造及配置使得當該匣體可移除式安裝至該裝置架時，選定基材可進給於該等核心之間並進入配合結構中，其中底基材自該第一核心展開並配置於選定基材的一側上，且該處的永久黏著劑層面向選定基材及展開且配

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

訂

泉

六、申請專利範圍

置在選定基材另一側上之黏著劑罩，使得選定基材、該底基材、及該罩基材能在該等配合結構中一同前進以完成一黏著劑轉移程序，其中該等配合結構相配合以對該等基材施壓，而將一部份永久黏著劑層黏結至選定基材，且該永久黏著劑層的一周圍部份沿選定基材的周圍延伸至該黏著劑罩基材，並接著將處理後的基材自該處往外排放，

該黏著劑罩基材及該等黏著劑層之性質係使得該等基材已排出該裝置之後，該黏著劑罩基材可隨後移離該底基材及選定基材，以將永久黏著劑層的周圍部份及該可移位黏著劑層之對應周圍部份自該底基材移除，因此將選定基材留在該底基材上，其間配置有部份永久及可移位黏著劑層，且大體上無黏著劑配置於選定基材的周圍之該底基材上；

提供該等黏著劑層，使得在該選定基材已黏結至該永久黏著劑層之後，該底基材及該選定基材可彼此移開，以使該底基材自該可移位黏著劑層分離，並將兩該等黏著劑層留在選定基材上並露出該可移位黏著劑層，故可使選定基材(a)藉由該露出的可移位黏著劑層與接觸表面相接合而可移位式黏至一接觸表面及(b)隨後自接觸表面移除並可移位式黏結至另一接觸表面。

80. 如申請專利範圍第79項之黏著劑移轉裝置，其中該等第一與第二核心為大體上呈柱形。

81. 如申請專利範圍第79項之黏著劑移轉裝置，其中該第一大體上呈徑向對該第一核心呈徑向往內以及第二大體上

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

六、申請專利範圍

呈徑向對該第一核心呈徑向往外。

82. 如申請專利範圍第79項之黏著劑移轉裝置，其中該其中該匣體具有一頂壁、一底壁、及延伸於該頂壁與底壁間之一對側壁。

83. 如申請專利範圍第82項之黏著劑移轉裝置，其中該匣體具有延伸於該等壁之間的一後壁，該後壁具有通過形成之一開口，可供選定基材通過進給入該裝置中。

84. 如申請專利範圍第80項之黏著劑移轉裝置，其中該等第一及第二核心為瓦楞板。

85. 如申請專利範圍第79項之黏著劑移轉裝置，其中該永久黏著劑層的厚度與性質使得該永久黏著劑層可穩固黏結至具有一紋理表面之一選定基材。

86. 如申請專利範圍第85項之黏著劑移轉裝置，其中該等黏著劑層直接彼此相結合，且其間無中介層，其中該可移位黏著劑層重量對於該永久黏著劑層重量之一重量比值大於1:1。

87. 如申請專利範圍第86項之黏著劑移轉裝置，其中該等黏著劑層具有大於20克每平方公尺之一組合密度。

88. 如申請專利範圍第87項之黏著劑移轉裝置，其中該可移位黏著劑係為一丙烯酸微滴型黏著劑。

89. 如申請專利範圍第88項之黏著劑移轉裝置，其中該組合密度大於25克每平方公尺。

90. 如申請專利範圍第89項之黏著劑移轉裝置，其中該組合密度為27克每平方公尺。

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

訂

六、申請專利範圍

91. 如申請專利範圍第79項之黏著劑移轉裝置，其中該永久黏著劑為一丙烯酸基的乳劑。

92. 如申請專利範圍第79項之黏著劑移轉裝置，其中該可移位黏著劑為一丙烯酸微滴型黏著劑。

93. 一種黏著劑移轉裝置，用於由一選定基材選擇性製造一可移位黏著基材，該裝置包含：

一底基材；

一層可移位黏著劑，配置於底基材上；

一層永久黏著劑，配置於鄰近與該底基材相對的該可移位黏著劑層；及

一具有釋放表面的釋放襯墊基材，該釋放襯墊基材、該底基材與該黏著劑層大體上呈平坦之平行關係配置，以界定一黏著劑移轉片和該釋放表面係可移除式接合與可移位黏著劑層及底基材相對之該永久黏著劑層，且該底基材因此可覆蓋該永久黏著劑層；

該釋放表面的性質使得該底基材以及該釋放襯墊基材能彼此移開並將兩黏著劑層留在該底基材上並露出永久黏著劑層，因而使該選定基材之後藉由該選定基材與該露出的永久黏著劑層的接合而黏接至該露出的永久黏著劑層；

提供該等黏著劑層，使得在該選定基材已黏結至該永久黏著劑層之後，該底基材及該選定基材可彼此移開，以使該底基材自該可移位黏著劑層分離，並將兩該等黏著劑層留在選定基材上並露出該可移位黏著劑層，故可使選定基材(a)藉由該露出的可移位黏著劑層與接觸表面相接合

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

六、申請專利範圍

而可移位式黏至一接觸表面及(b)隨後自接觸表面移除並可移位式黏結至另一接觸表面；

該黏著劑轉移裝置進一步包含一黏著劑罩基材，其配置鄰接相對於該等黏性層之釋放襯墊基材，該釋放襯墊基材已從該底基材移開，以使該釋放表面自該永久黏著劑層分離，且選定基材已黏結至該永久黏著劑層之後，但在選定基材已自該底基材移開，以使該底基材自該可移位黏著劑層分離之前，該黏著劑罩基材可以覆蓋關係位於選定基材上方，而一部份黏著劑基材罩接合了選定基材，而一部份黏著劑基材罩接合了永久黏著劑層露出選定基材周圍的周圍部份，故該永久黏著劑層的周圍部份結合至該黏著劑基材罩的方式使得該黏著劑基材罩隨後可移開該底基材及選定基材，以使永久黏著劑層的周圍部份及該可移位黏著劑層之對應的周圍部份自該底基材移除，因此將選定基材留在該底基材上，其間配置有永久黏著劑及可移位黏著劑層的部份，並大體上無黏著劑沿選定基材的周圍配置於該底基材上。

94. 如申請專利範圍第93項之黏著劑移轉裝置，其進一步包含該等多數合併的黏著劑移轉片。

95. 如申請專利範圍第94項之黏著劑移轉裝置，其中各該等黏著劑移轉片大體上呈長方型。

96. 如申請專利範圍第93項之黏著劑移轉裝置，其中該永久黏著劑層的厚度與性質使得該永久黏著劑層可穩固黏結至具有一紋理表面之選定基材。

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

訂

六、申請專利範圍

97. 如申請專利範圍第96項之黏著劑移轉裝置，其中該黏著劑層直接彼此相結合，且其間無中介層，其中該可移位黏著劑層重量對於該永久黏著劑層重量之一重量比值大於1:1。

98. 如申請專利範圍第97項之黏著劑移轉裝置，其中該等黏著劑層具有大於20克每平方公尺之一組合密度。

99. 如申請專利範圍第98項之黏著劑移轉裝置，其中該可移位黏著劑係為一丙烯酸微滴型黏著劑。

100. 如申請專利範圍第99項之黏著劑移轉裝置，其中該組合密度係大於25克每平方公尺。

101. 如申請專利範圍第100項之黏著劑移轉裝置，其中該組合密度為27克每平方公尺。

102. 如申請專利範圍第93項之黏著劑移轉裝置，其中該永久黏著劑係為一丙烯酸基的乳劑。

103. 如申請專利範圍第93項之黏著劑移轉裝置，其中該可移位黏著劑係為一丙烯酸微滴型黏著劑。

104. 一種黏著劑移轉裝置，用於由一選定基材選擇性製造一可移位黏著基材，該裝置包含：

一底基材；

提供一可移位黏著劑層，配置於底基材上；配置一永久黏著劑層鄰近與底基材相對之可移位黏著劑層；以及

一具有釋放表面之釋放襯墊基材，該釋放襯墊基材、該底基材與該等黏著劑層大體上呈平坦之平行關係配置，以界定一黏著劑移轉片和該釋放表面係可移除式接合與可

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

六、申請專利範圍

移位黏著劑層及底基材相對之該永久黏著劑層，且該底基材因此可覆蓋該永久黏著劑層；

該釋放表面的性質使得該底基材及提供釋放表面的該結構可彼此移開，以使該釋放表面自該永久黏著劑層脫離，並將兩該等黏著劑層留在該底基材上而露出該永久黏著劑層，故可藉由該露出的永久黏著劑層與該選定基材相接合，而使該選定基材黏結至該露出的永久黏著劑層；

提供該等黏著劑層，使得在該選定基材已黏結至該永久黏著劑層之後，該底基材及該選定基材可彼此移開，以使該底基材自該可移位黏著劑層分離，並將兩該等黏著劑層留在選定基材上並露出該可移位黏著劑層，故可使選定基材(a)藉由該露出的可移位黏著劑層與接觸表面相接合而可移位式黏至一接觸表面及(b)隨後自接觸表面移除並可移位式黏結至另一接觸表面；

該釋放襯墊基材具有與該釋放表面相對之一剝除表面，其對於黏著劑結合具有比起該釋放表面較高之一親和力，該等剝除表面的性質使得在釋放襯墊已經移開該底基材以使該釋放表面自該永久黏著劑層分離且選定基材已黏結至該永久黏著劑層之後，但在選定基材已經移開該底基材以使該底基材自該可移位黏著劑層分離之前，該釋放襯墊基材可以覆蓋關係重新定向並定位在選定基材中，其中一部份剝除表面接合了選定基材，而一部份剝除表面接合了永久黏著劑層露出選定基材的周圍之周圍部份，故該永久黏著劑層的周圍部份結合至該剝除表面的方式使得該釋放

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

訂

六、申請專利範圍

襯墊可隨後移開該底基材及選定基材，以將永久黏著劑層的周圍部份及該可移位黏著劑層之對應的周圍部份自該底基材移除，因此將選定基材留在該底基材上，其間配置有永久及可移位黏著劑層，且在選定基材周圍部份的該底基材上大體上無配置黏著劑。

105. 如申請專利範圍第104項之黏著劑移轉裝置，其中進一步包含多數合併的該等黏著劑移轉片。

106. 如申請專利範圍第105項之黏著劑移轉裝置，其中各該等黏著劑移轉片大體上呈長方型。

107. 如申請專利範圍第104項之黏著劑移轉裝置，其中該永久黏著劑層的厚度與性質使得該永久黏著劑層可穩固黏結至具有一紋理表面之選定基材。

108. 如申請專利範圍第107項之黏著劑移轉裝置，其中該黏著劑層直接彼此相結合，且其間無中介層，其中該可移位黏著劑層重量對於該永久黏著劑層重量之一重量比值大於1:1。

109. 如申請專利範圍第108項之黏著劑移轉裝置，其中該等黏著劑層具有大於20克每平方公尺之一組合密度。

110. 如申請專利範圍第109項之黏著劑移轉裝置，其中該可移位黏著劑係為一丙烯酸微滴型黏著劑。

111. 如申請專利範圍第110項之黏著劑移轉裝置，其中該組合密度係大於25克每平方公尺。

112. 如申請專利範圍第111項之黏著劑移轉裝置，其中該組合密度為27克每平方公尺。

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

六、申請專利範圍

113. 如申請專利範圍第104項之黏著劑移轉裝置，其中該永久黏著劑係為一丙烯酸基的乳劑。

114. 如申請專利範圍第104項之黏著劑移轉裝置，其中該可移位黏著劑係為一丙烯酸微滴型黏著劑。

115. 一種用於製造可移位黏著基材的方法，該方法由一選定基材選擇性與可移位黏著該可移位黏著基材至一接觸表面，該方法包含：

由使用者之要求選擇該選定基材製成該可移位黏著基材；

提供一黏著劑轉移裝置包含：一底基材；

提供一可移位黏著劑層於該底基材上；

提供一永久黏著劑層鄰接於該基材相對之可移位黏著劑層；以及

提供一釋放表面之結構，該釋放表面係可移除式接合與可移位黏著劑層及該底基材相對之該永久黏著劑層，以覆蓋該永久黏著劑層；

該釋放表面的性質使得該底基材及提供釋放表面的該結構可彼此移開，以使該釋放表面自該永久黏著劑層脫離，並將兩該等黏著劑層留在該底基材上而露出該永久黏著劑層，故可藉由該露出的永久黏著劑層與該選定基材相接合，而使該選定基材黏結至該露出的永久黏著劑層；

提供該等黏著劑層使得該選定基材黏結至該露出的永久黏著劑層後，該底基材與該選定基材能彼此分離，以使該選定基材自該可移位黏著劑層分離，並將兩該等黏著劑

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

訂

六、申請專利範圍

層留在該底基材上而露出該可移位黏著劑層；

自該等黏著劑層移開該釋放表面，以使該選定基材自該可移位黏著劑層分離，並將兩該等黏著劑層留在該底基材上而露出該永久黏著劑層；

由使用者之要求接合該露出的永久黏著劑層與該選定基材，以使該露出的永久黏著劑層與該選定基材黏性結合；

將該底基材與該選定基材彼此移開，以使該選定基材自該可移位黏著劑層分離，並將兩該等黏著劑層留在該底基材上並露出該永久黏著劑層，故可使選定基材上留下兩者黏著劑層之部分且該可移位黏著劑層露出，以及自兩者黏著劑層之部分分離該底基材；

由使用者之要求選擇一由該選定基材完全分離的接觸表面；

露出的可移位黏著劑層在該選定基材上與接觸表面相接合，以便該選定基材以該可移位黏著劑層可移位式黏至該接觸表面一接觸表面，因此使得使用者自該接觸表面移除該選定基材且可移位式地黏著該選定基材至另一接觸表面，亦可自該接觸表面或使用者之要求之相同接觸表面分離。

116. 如申請專利範圍第115項之用於製造可移位黏著基材的方法，其中該永久黏著劑層的厚度與性質使得該永久黏著劑層可穩固黏結至具有一紋理表面之選定基材。

117. 如申請專利範圍第115項之用於製造可移位黏著基材

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

六、申請專利範圍

的方法，其中該黏著劑層直接彼此相結合，且其間無中介層，其中該可移位黏著劑層重量對於該永久黏著劑層重量之一重量比值大於1:1。

118. 如申請專利範圍第116項之用於製造可移位黏著基材的方法，其中該等黏著劑層具有大於20克每平方公尺之一組合密度。

119. 如申請專利範圍第117項之用於製造可移位黏著基材的方法，其中該可移位黏著劑係為一丙烯酸微滴型黏著劑。

120. 如申請專利範圍第118項之用於製造可移位黏著基材的方法，該組合密度係大於25克每平方公尺。

121. 如申請專利範圍第119項之用於製造可移位黏著基材的方法，其中該組合密度為27克每平方公尺。

122. 如申請專利範圍第115項之用於製造可移位黏著基材的方法，其中該永久黏著劑係為一丙烯酸基的乳劑。

123. 如申請專利範圍第115項之用於製造可移位黏著基材的方法，其中該可移位黏著劑係為一丙烯酸微滴型黏著劑。

124. 如申請專利範圍第115項之用於製造可移位黏著基材的方法，其中該結構界定該釋放表面為一釋放襯墊基材，該釋放襯墊基材、該底基材以及該等黏著劑層大體上呈平坦之平行關係配置，以界定一黏著劑移轉片；

其中自該釋放表面移離該等黏著劑表面，使得兩該等黏著劑層留在該底基材上而露出該永久黏著劑層，該露出

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

訂

六、申請專利範圍

之該永久黏著劑層由自該等黏著劑層及該底基材移離該釋放襯墊表現。

125. 如申請專利範圍第123項之用於製造可移位黏著基材的方法，其中該黏著劑轉移裝置進一步包含一黏著劑罩基材，其位置鄰近與該黏著劑層相對之該釋放襯墊基材，該黏著劑罩基材的性質使得在釋放襯墊基材已從該底基材移開，以使該釋放表面自該永久黏著劑層分離，且選定基材已黏結至該永久黏著劑層之後，但在選定基材已自該底基材移開，以使該底基材自該可移位黏著劑層分離之前，該黏著劑罩基材可以覆蓋關係位於選定基材上方，而一部份黏著劑基材罩接合了選定基材，而一部份黏著劑基材罩接合了永久黏著劑層露出選定基材周圍的周圍部份，故該永久黏著劑層的周圍部份結合至該黏著劑基材罩的方式使得該黏著劑基材罩隨後可移開該底基材及選定基材，以使永久黏著劑層的周圍部份及該可移位黏著劑層之對應的周圍部份自該底基材移除，因此將選定基材留在該底基材上，其間配置有永久黏著劑及可移位黏著劑層的部份，並大體上無黏著劑沿選定基材的周圍配置於該底基材上；

該方法進一步包含：

在釋放襯墊基材已經移開該底基材以使該釋放表面自該永久黏著劑層分離且選定基材已黏結至該永久黏著劑層之後，但在選定基材已經移開該底基材以使該底基材之前，使該底基材自該可移位黏著劑層分離，該黏著劑罩基材可以覆蓋關係重新定向並定位在選定基材中，其中一部份

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

六、申請專利範圍

黏著劑罩接合了選定基材，而一部分剝除表面接合了永久黏著劑層露出選定基材的周圍之周圍部份，故該永久黏著劑層的周圍部份結合至該黏著劑層；

接著相對該底基材及該選定基材移動該黏著劑層，以便移開該永久黏著劑層的周圍及該可移位黏著劑層之對應的周圍部份自該底基材移除，因此將選定基材留在該底基材上，其間配置有永久黏著劑及可移位黏著劑層的部份，並大體上無黏著劑沿選定基材的周圍配置於該可移位黏著劑層上。

126. 如申請專利範圍第123項之用於製造可移位黏著劑層的方法，其中該釋放襯墊基材具有與該釋放表面相對之一剝除表面，其對於黏著劑結合具有比起該釋放表面較高之一親和力，該等剝除表面的性質使得在釋放襯墊基材已經移開該底基材以使該釋放表面自該永久黏著劑層分離且選定基材已黏結至該永久黏著劑層之後，但在選定基材已經移開該底基材以使該底基材自該可移位黏著劑層分離之前，該釋放襯墊基材可以覆蓋關係定位在選定基材中，其中一部份剝除表面接合了選定基材，而一部分剝除表面接合了永久黏著劑層露出選定基材的周圍之周圍部份，故該永久黏著劑層的周圍部份結合至該剝除表面；

該方法進一步包含：

在釋放襯墊基材已經移開該底基材以使該釋放表面自該永久黏著劑層分離且選定基材已黏結至該永久黏著劑層之後，但在選定基材已經移開該底基材以使該底基材之前

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

訂

六、申請專利範圍

，使該底基材自該可移位黏著劑層分離，該黏著劑層基材可以覆蓋關係重新定向並定位在選定基材中，其中一部份剝除表面接合了選定基材，而一部份剝除表面接合了永久黏著劑層露出選定基材的周圍之周圍部份，故該永久黏著劑層的周圍部份結合至該剝除表面；

接著相對該底基材及該選定基材移動該釋放襯墊，以便移開該永久黏著劑層的周圍及該可移位黏著劑層之對應的周圍部份自該底基材移除，因此將選定基材留在該底基材上，其間配置有永久黏著劑及可移位黏著劑層的部份，並大體上無黏著劑沿選定基材的周圍配置於該可移位黏著劑基材上。

127. 如申請專利範圍第123項之用於製造可移位黏著基材的方法，其進一步包含多數合併的該等黏著劑移轉片。

128. 如申請專利範圍第126項之用於製造可移位黏著基材的方法，其中各該等黏著劑移轉片大體上呈長方型。

129. 如申請專利範圍第115項之用於製造可移位黏著基材的方法，其中該黏著劑轉移裝置進一步包含一核心且其中該界定該釋放表面的結構係為與該黏著劑層相對之該底基材的一表面，該底基材捲繞在該核心上使得該釋放表面係面向相對於該核心大體上呈徑向往外，而該等黏著劑層相對於該核心大體上呈徑向往內，且其中該永久黏著劑層可移除式接合該釋放表面，

其中該釋放表面自該等黏著劑層移離，以使兩該等黏著劑層留在底基材上並露出該永久黏著劑層，因此藉由展

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

六、申請專利範圍

開該底基材與該釋放表面分離且該永久黏著劑層與兩該等黏著劑層留在該底基材上而露出該永久黏著劑層。

130. 如申請專利範圍第128項之用於製造可移位黏著基材的方法，其中該黏著劑轉移裝置進一步包含一架，該架具有可人工接合握柄部，該核心可旋轉式安裝至該架，使得一用者可展開該底基材且將黏著劑層施加至選定基材；

該方法進一步包含：

在接合該露出之永久黏著劑層與該選定基材及可黏性結合該永久黏著劑層至該選定基材後，相對該選定基材移動該架，使該選定基材的額外部分自該核心展開，因此在該額外部分的永久黏著劑層露出且之後黏著地黏接至該選定基材。

131. 如申請專利範圍第129項之用於製造可移位黏著基材的方法，其中該黏著劑轉移裝置進一步包含一施壓元件安裝於該架上，該施壓元件的構造與配置可對底基材施壓，使該底基材與該處相聯的永久黏著劑層黏結式結合至該選定基材。

132. 如申請專利範圍第128項之用於製造可移位黏著基材的方法，其中展開該底基材為由展開該底基材之一自由端部且該自由端部在該釋放表面移開而完成。

133. 如申請專利範圍第131項之用於製造可移位黏著基材的方法，其中該黏著劑轉移裝置進一步包含一架，該架具有可人工接合握柄部，該核心可旋轉式安裝至該架，使得一用者可展開該底基材且將黏著劑層施加至選定基材；

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

訂

六、申請專利範圍

該方法進一步包含：

在接合該露出之永久黏著劑層與該選定基材及可黏性結合該永久黏著劑層至該選定基材後，相對該選定基材移動該架，以沿該選定基材之一對應部份配送一長度的該底基材，並將與配送長度相聯之暴露的永久黏著劑層黏結至對應部份的選定基材，

接者自該選定基材移動該底基材的配送長度使該底基材的配送長度自該可移位黏著劑層分離且兩該等黏著劑層留在該選定基材上且露出可移位黏著劑層。

134. 如申請專利範圍第132項之用於製造可移位黏著基材的方法，其中該黏著劑轉移裝置進一步包含一施壓元件安裝於該架上，構成與排列該施壓元件以施壓至該底基材之部分即與該選定基材接合，以保證該結合的永久黏著劑層黏接至該選定基材。

135. 如申請專利範圍第115項之用於製造可移位黏著基材的方法，其中該黏著劑轉移裝置與一黏著劑轉移器聯結使用，該黏著劑轉移器包含一架以及安裝於該架之一對配合結構，該黏著劑轉移裝置進一步包含：一匣體，其構造與配置係可移除式安裝至該黏著劑轉移器架；一對大體上呈圓柱形核心，可旋轉式安裝至該匣體；該釋放表面，係由與該等黏著劑層相對之該底基材的一表面所提供，該底基材捲繞在一第一之該等核心上，使得該釋放表面相對於該第一核心大體上呈徑向往外，而該等黏著劑層相對於該第一核心大體上呈徑向往內，其中該永久黏著劑層係可移除

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

六、申請專利範圍

式接合該釋放表面，該釋放表面的性質使得該底基材之一自由端部可展開並移離該底基材的一徑向往內相鄰部的釋放表面，以使該永久黏著劑層自該底基材的徑向往內相鄰部的釋放表面分離，並將兩該等黏著劑層留在該底基材的自由端上而露出該永久黏著劑層，因而該自由端可進入該黏著劑轉移器的配合結構之間；以及

一黏著劑罩基材，捲繞在一第二該等核心上，該黏著劑罩基材對於黏著劑結合，比起該釋放表面具有一較高的親和力；

該方法進一步包含：

選定基材可進給於該等配合結構間，其中底基材自該第一核心展開並配置於選定基材的一側上，且該處的永久黏著劑層面向了選定基材且黏著劑罩展開並配置在選定基材另一側上；

該選定基材、該底基材、及該罩基材能在該等配合結構中一同前進以完成一黏著劑轉移程序，其中該等配合結構相配合以對該等基材施壓，而將一部份永久黏著劑層黏結至選定基材，且該永久黏著劑層的一周圍部份沿選定基材的周圍延伸至該黏著劑罩基材，並接著將處理後的基材自該處往外排放；

自該底基材及該選定基材移開該黏著劑罩，以使該永久黏著劑層的周圍部份與該可移位黏著層之配合周圍部分自該底基材移開，因此將選定基材留在該底基材上，其間配置有部份永久及可移位黏著劑層，且大體上無黏著劑配

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

訂

六、申請專利範圍

置於選定基材的周圍之該底基材上。

136. 如申請專利範圍第115項之用於製造可移位黏著基材的方法，其中選擇該選定基材由選擇名片、窗戶標語、照片、及圖表之一實行之。

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

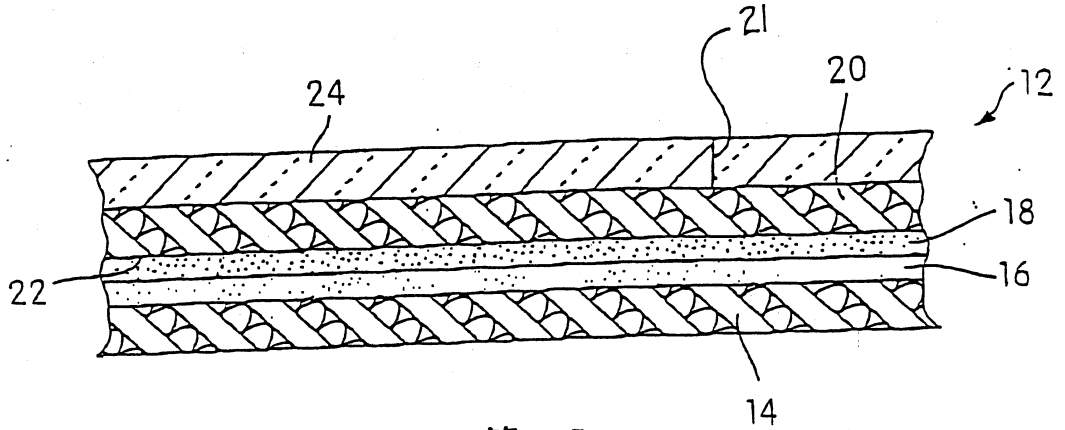
裝

訂

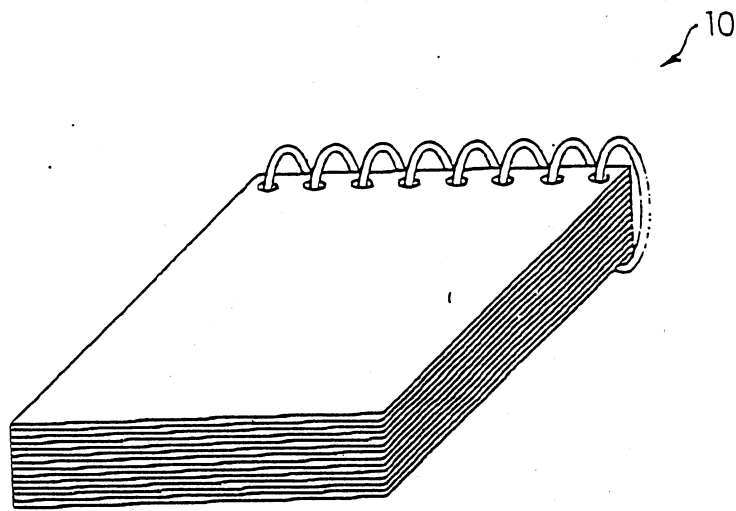
線

公告本

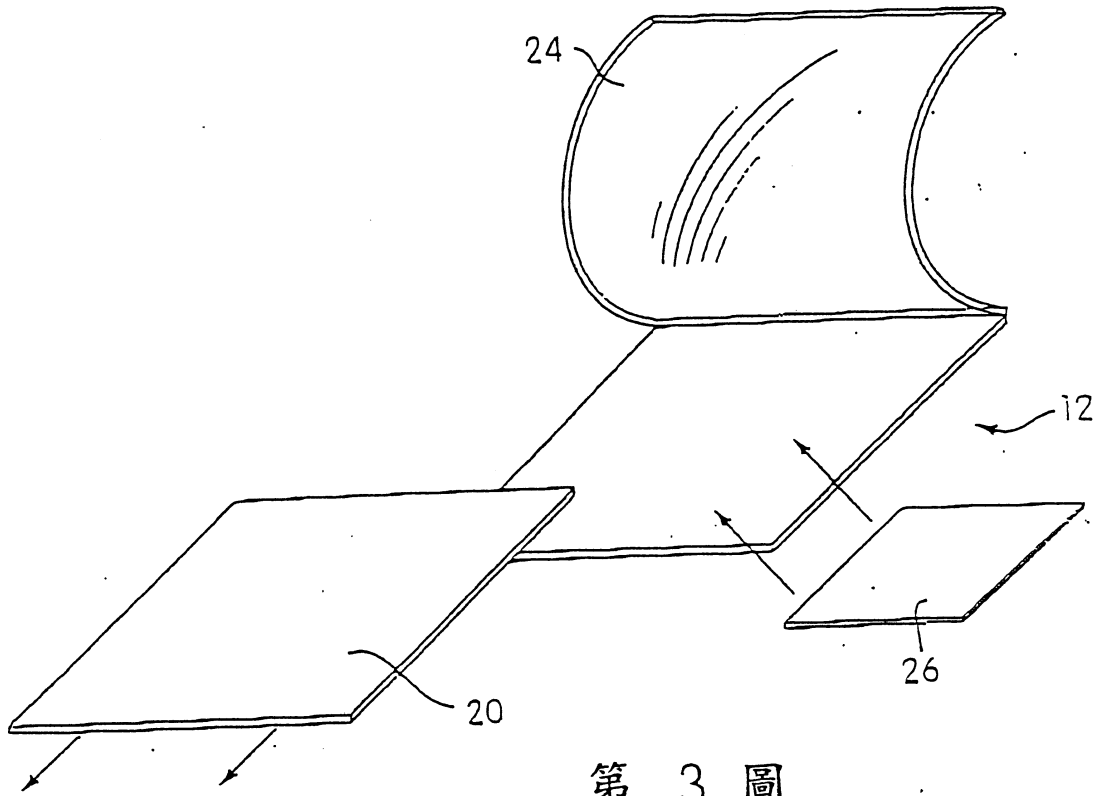
88111106



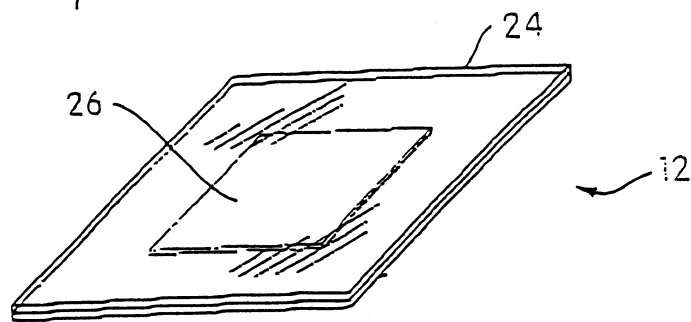
第 1 圖



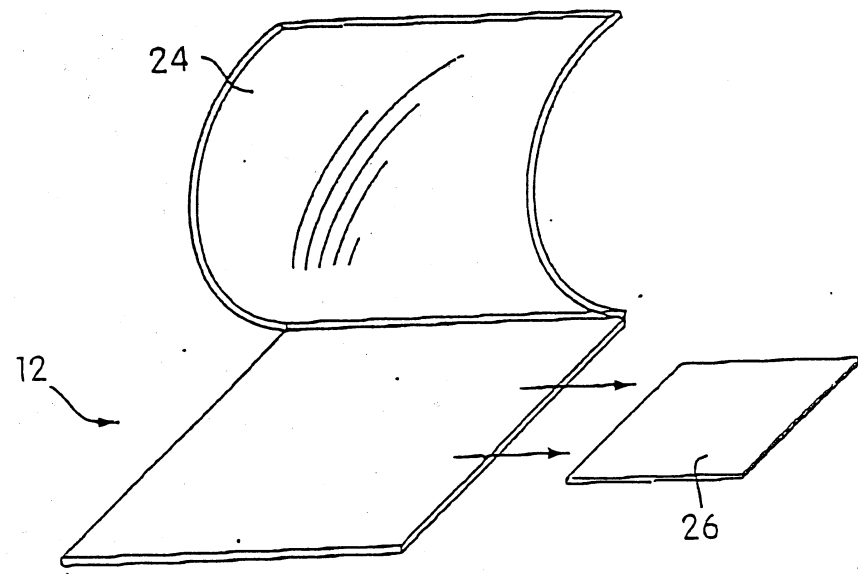
第 2 圖



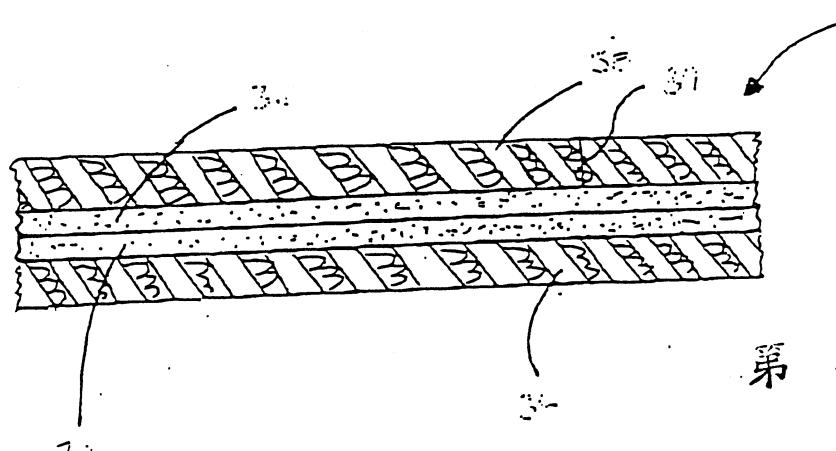
第 3 圖



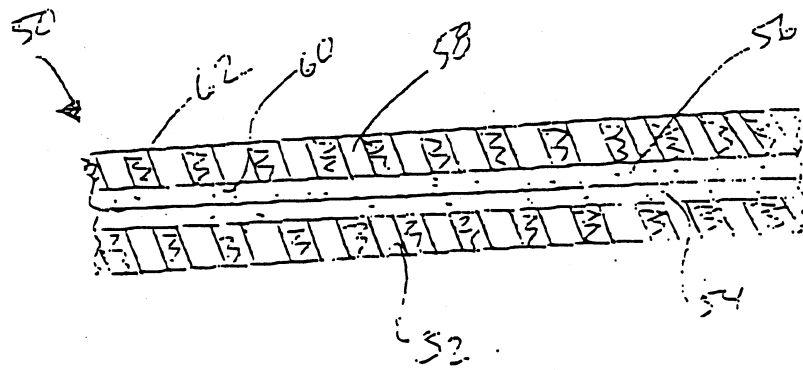
第 4 圖



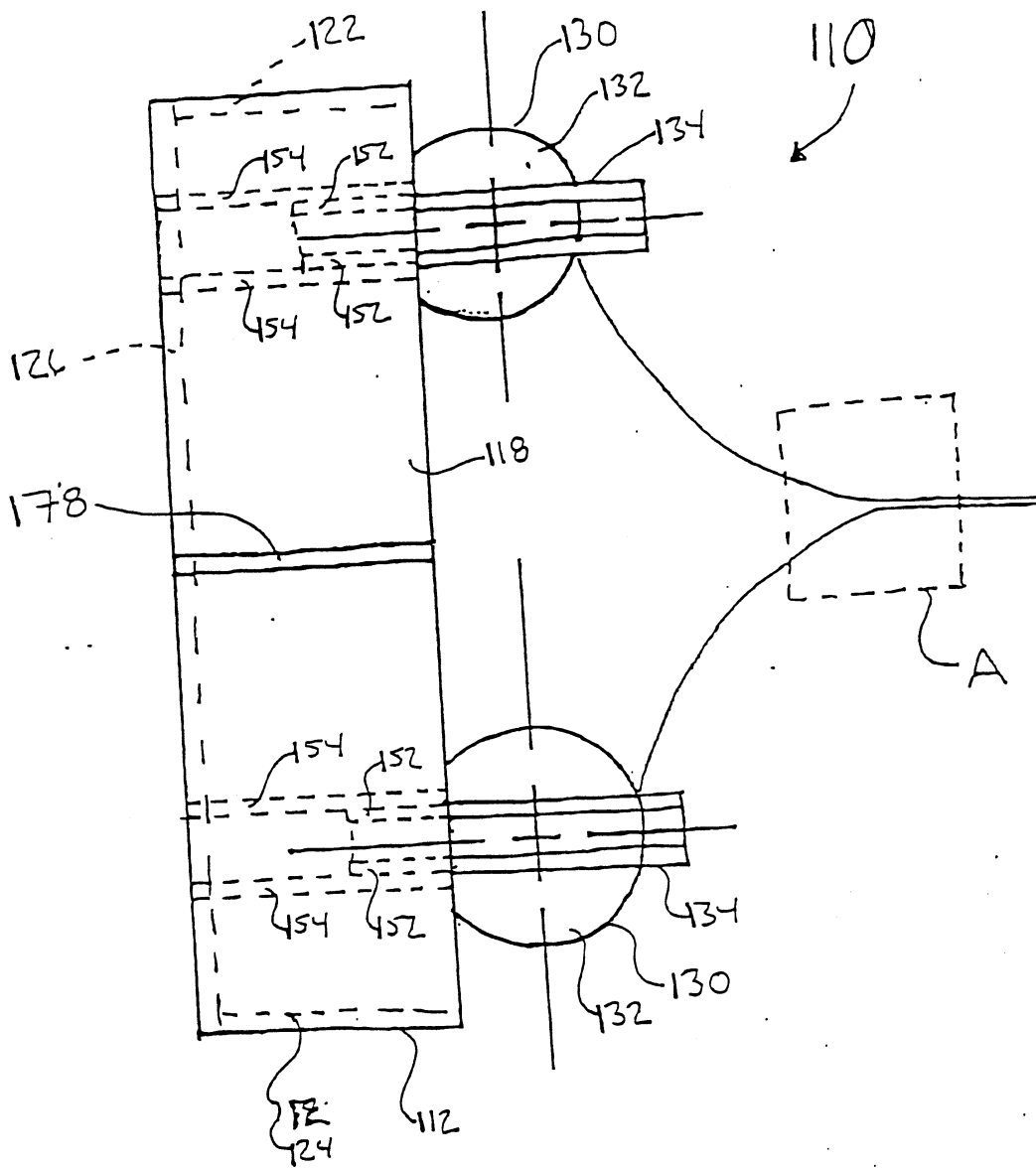
第 5 圖



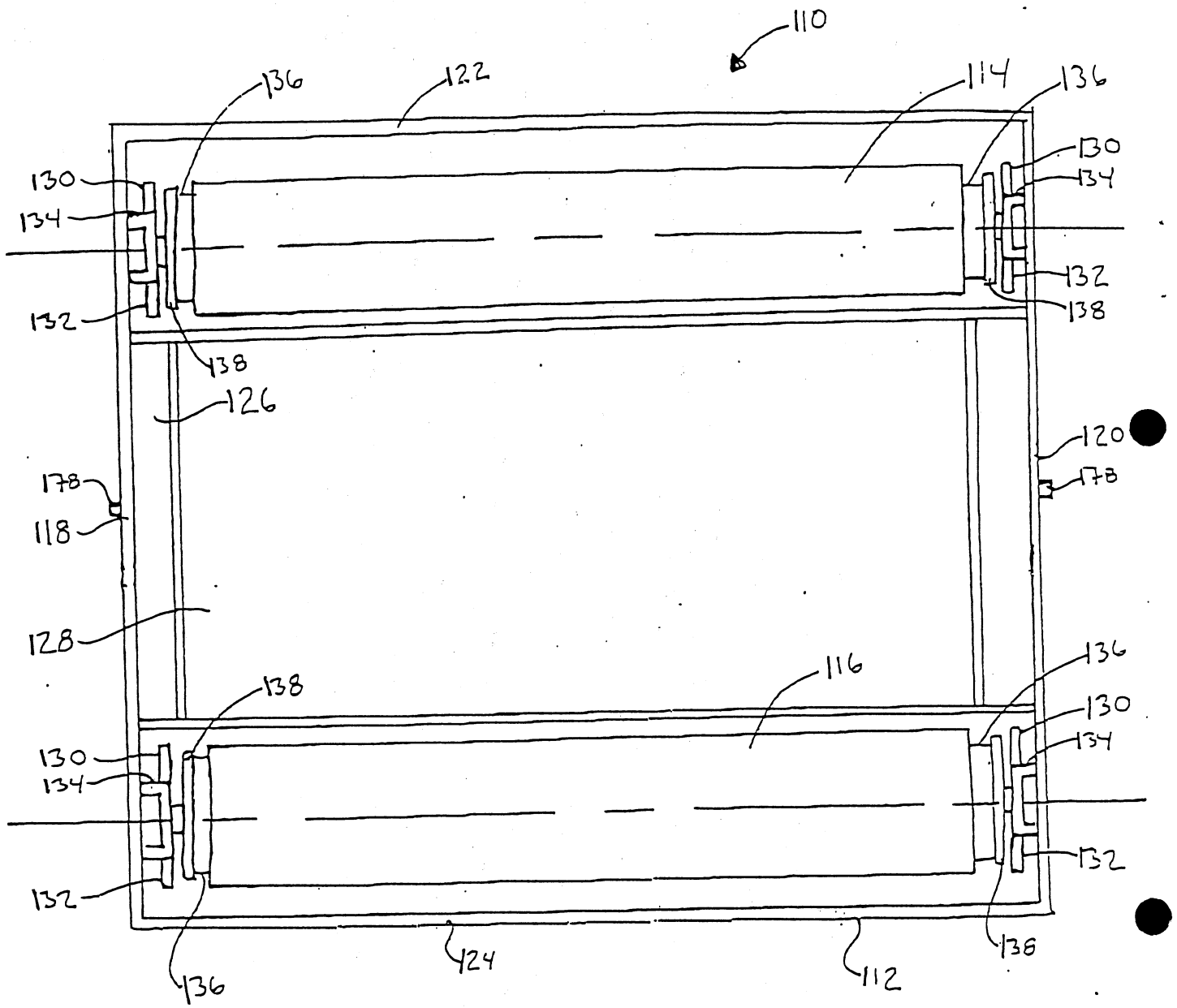
第 6 圖



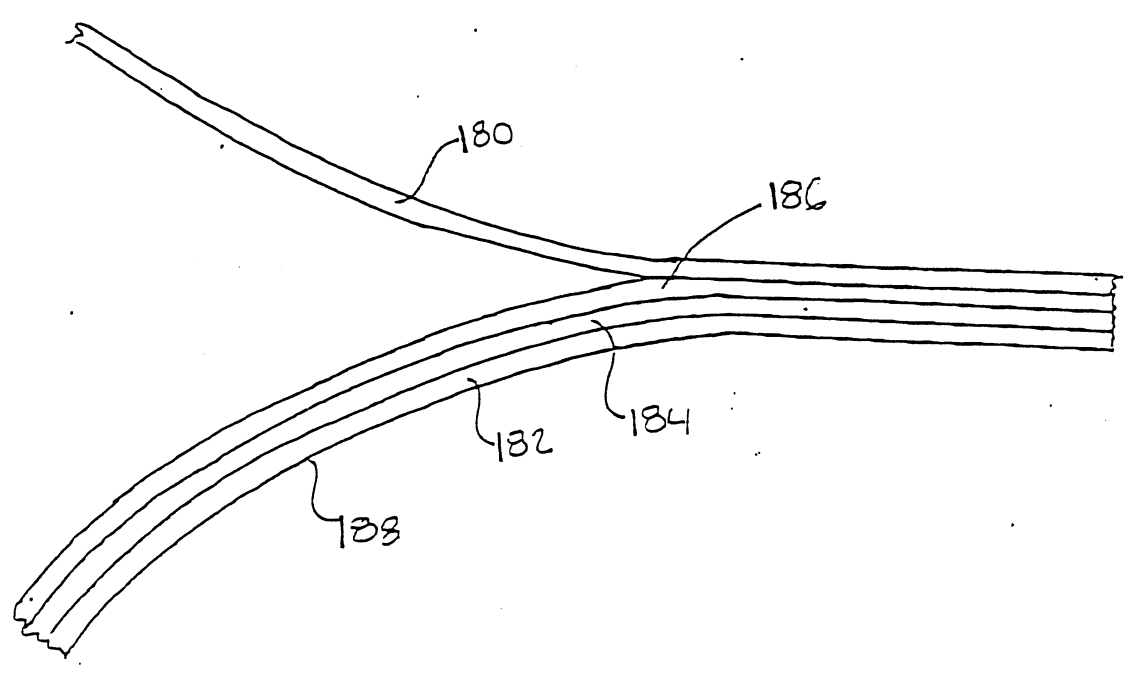
第一圖



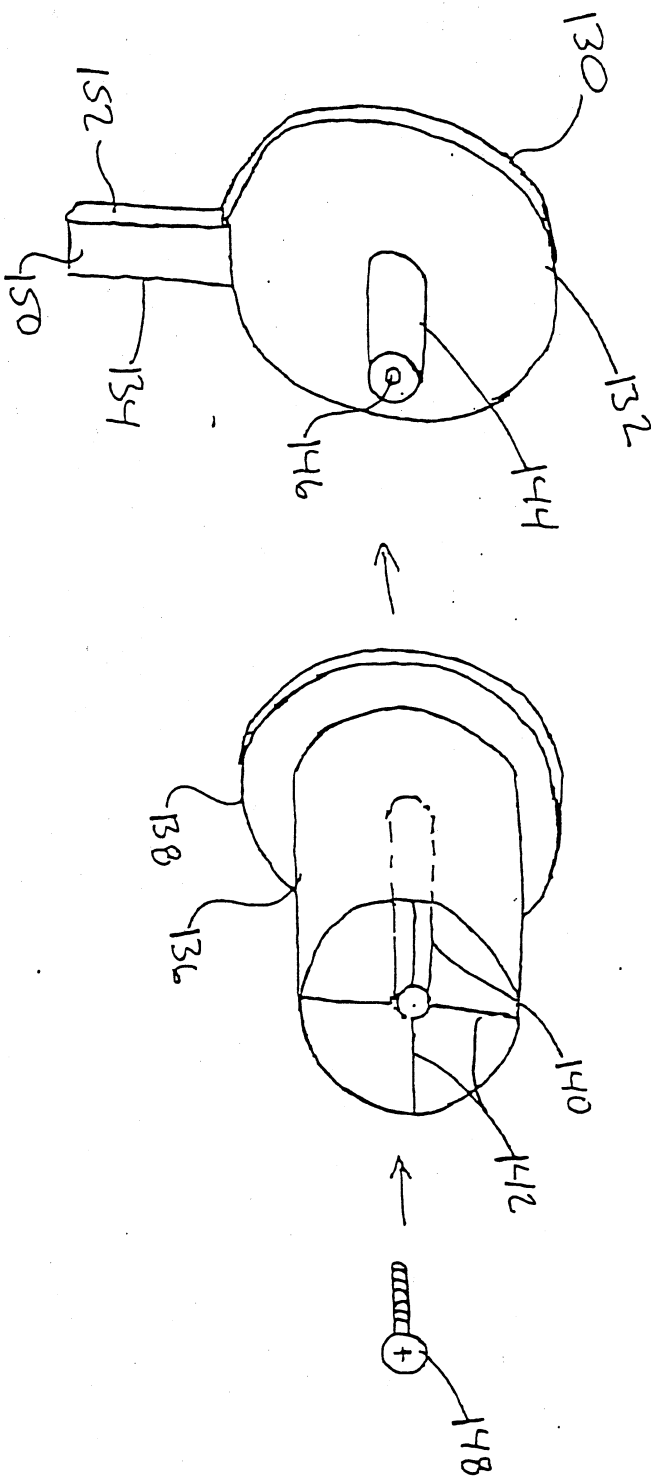
第 8 圖



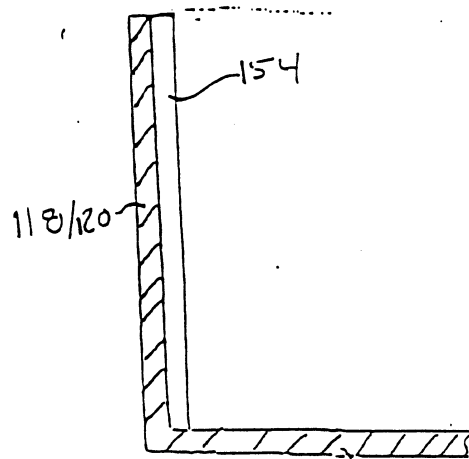
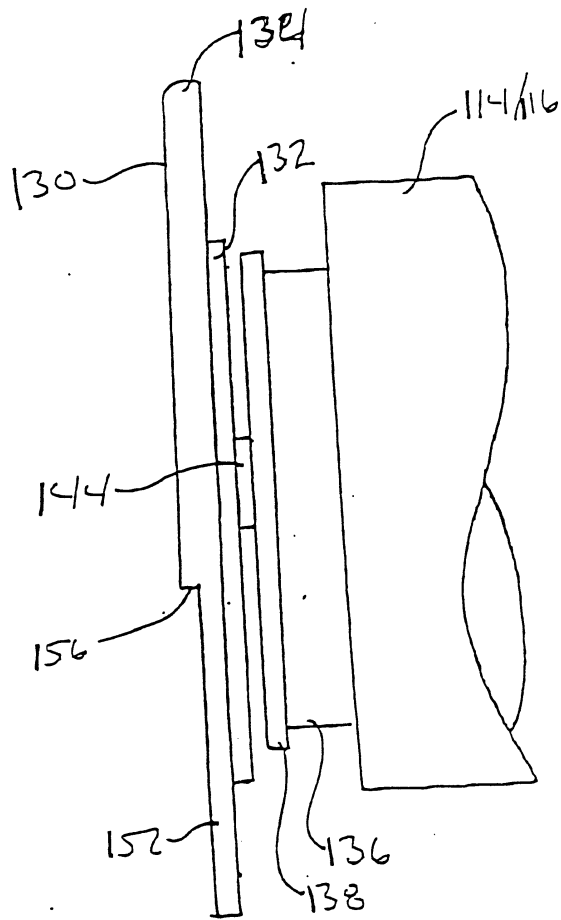
第 9 圖



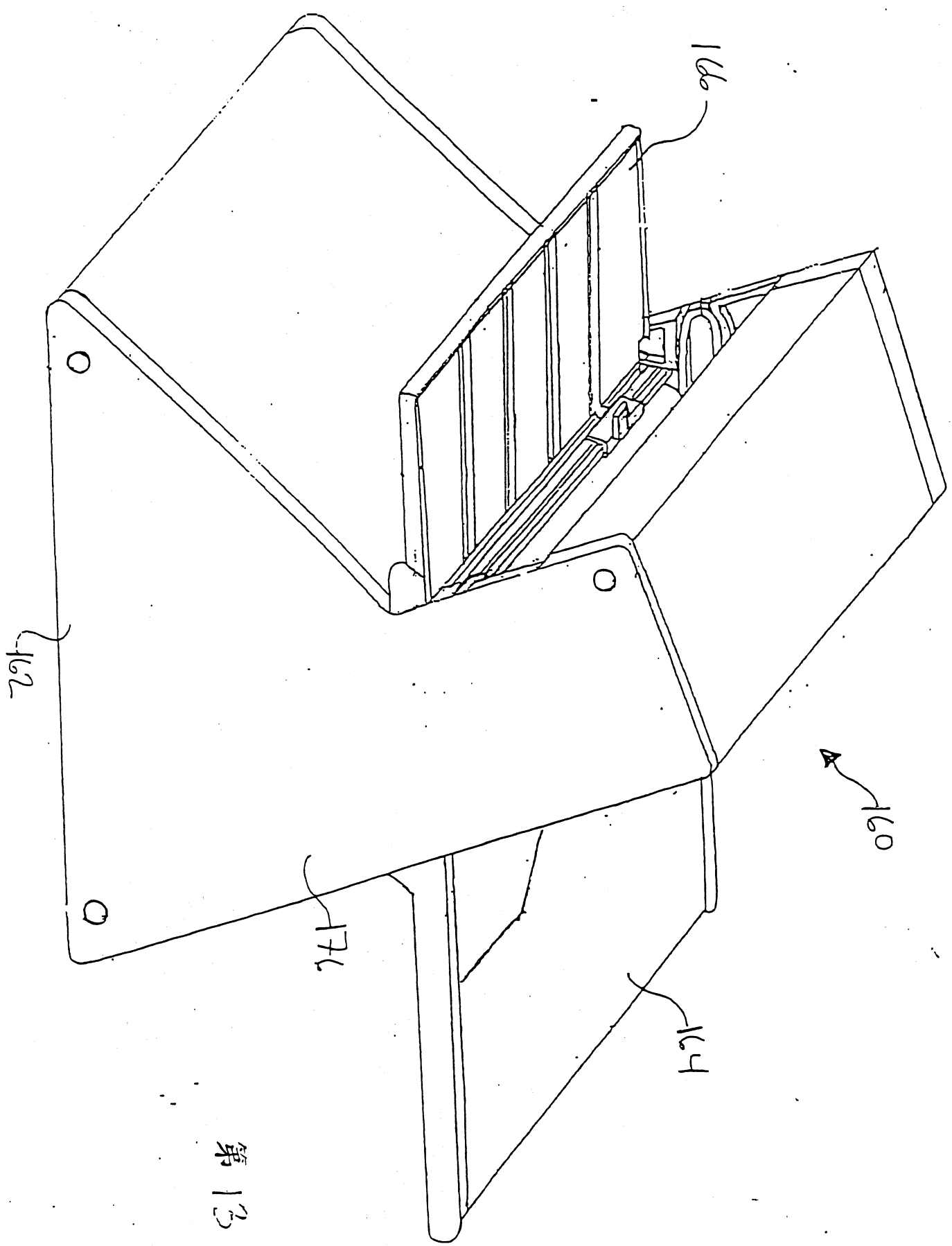
第 10 圖



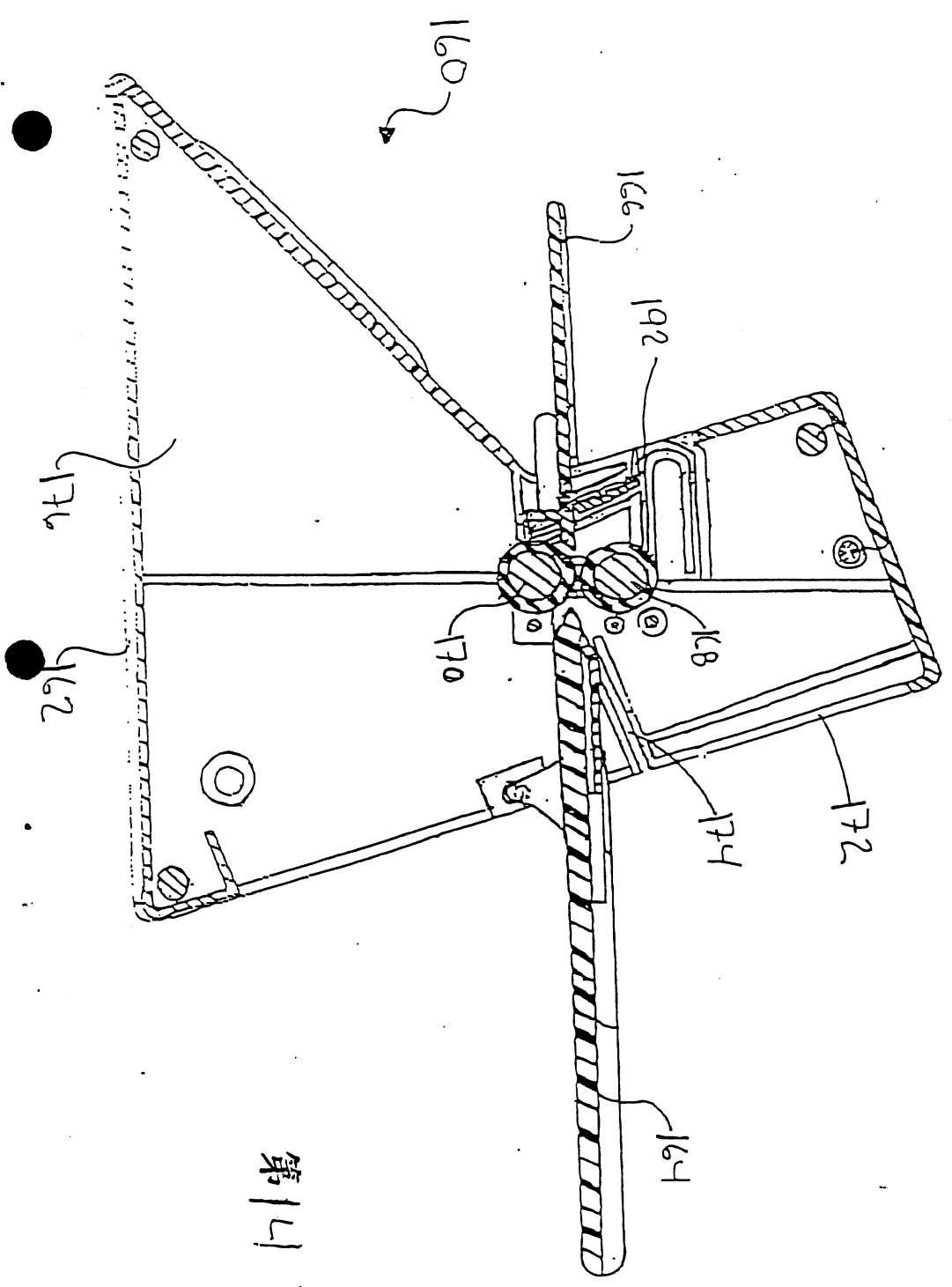
第 11 圖



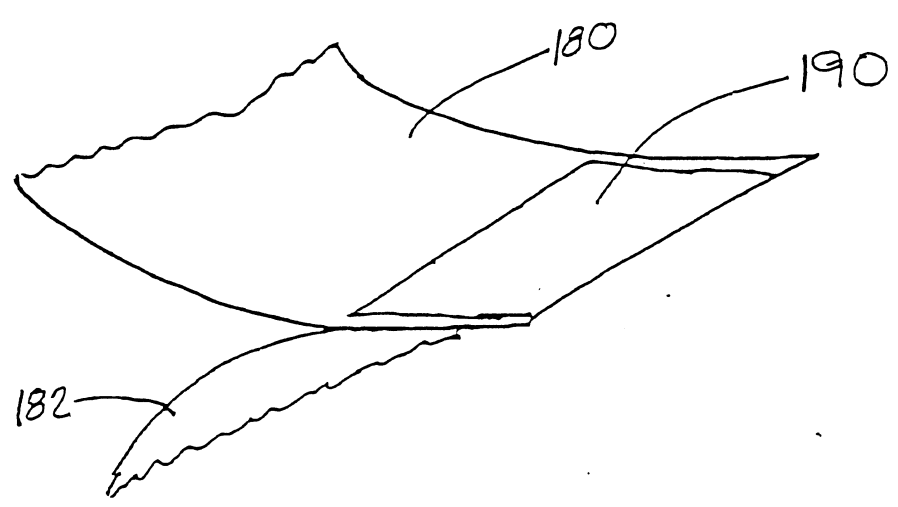
第 12 圖



第 13 圖



第14圖



第 15 圖

